



安全理事会

Distr.: General
13 October 2006
Chinese
Original: French

2006 年 10 月 13 日法国常驻联合国代表给安全理事会主席的信

谨随函转递与核计划有关的物项、材料、设备、货物和技术清单(见附件)。请作出必要安排，将该清单作为安全理事会文件印发为荷。

让-马克·德拉萨布利埃 (签名)



2006 年 10 月 13 日法国常驻联合国代表给安全理事会主席的信的
附件

[原件：英文]

与核计划有关的物项、材料、设备、货物和技术清单

情况通报

INFCIRC/254/Rev.8/Part 1^a

Date: 28 March 2006

General Distribution

Chinese

Original: English

一些成员国关于核材料、核设备和 核技术出口准则的信函

1. 国际原子能机构总干事已收到阿根廷、澳大利亚、奥地利、白俄罗斯、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、中国、克罗地亚、捷克共和国、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、日本、大韩民国、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、新西兰、波兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国常驻原子能机构的代表 2005 年 12 月 1 日关于核材料、核设备和核技术出口的普通照会。
2. 这些普通照会的目的是提供这些政府关于“核转让准则”的进一步情况。
3. 根据每份普通照会末尾所表达的愿望，现将这些普通照会的正文附后，并全文复载这些普通照会的附文。

^a 经修订的 INFCIRC/254/Part 2 号文件载有《与核有关的两用设备、材料、软件和相关技术的转让准则》。

普通照会

[国名]常驻代表团向国际原子能机构（原子能机构）总干事致意，并荣幸地提及[以前的相关信函]，在该（这些）信函中，[国名]政府决定按照现作为INFCIRC/254/Rev.7/Part 1号文件（包括附件）公布的“核转让准则”行事。

为了更明确地确定核供应国集团参加国政府认为对履行该准则至关重要的实施标准，[国名]政府已决定对该准则的若干部分作如下修订：

- 关于向无核武器国家转让触发清单物项或相关技术的保障问题，在第 4(a)段中增加了新案文，以阐明供应方应当在什么情况下批准这类转让。
- 关于触发清单物项和相关技术再转让的控制问题，在第 9 段中新增了(d)分段，以强调在接受方没有建立适当和有效的国家出口和转运控制的情况下，供应方应当考虑限制措施。
- 在该准则中新增了第 15 段，以响应联合国安理会第 1540 号决议规定的义务。当前的第 15 段重新编号为第 16 段，后续所有段落依次重新编号。
- 最后，在重新编号的第 16 段中增列了新案文，以详细说明核供应国集团对不遵守保障协定的情况应当采取的应对措施。

为清晰起见，附文中全文复载经修订的准则及其附件，以及“‘核转让准则’（INFCIRC/254/Rev.7/Part 1）修改对照表”。

[国名]政府已决定按照经如此修订的准则行事。

在作出这项决定时，[国名]政府充分认识到在促进经济发展的同时，避免以任何方式助长核武器或其他核爆炸装置扩散或被转用于核恐怖主义行为的必要性，并且有必要将不扩散或不转用的保证问题与商业竞争问题区分开来。

[就欧洲联盟内的贸易而言，[国名]政府将根据作为欧盟成员国所作的承诺执行此决定。]¹

如蒙原子能机构总干事提请全体成员国注意本照会及其附文，[国名]政府将不胜感激。

[国名]常驻代表团借此机会再次向国际原子能机构总干事表示最崇高的敬意。

¹ 仅在欧盟成员国的普通照会中包含此段。

核 转 让 准 则

1. 下列有关保障和出口控制的基本原则应适用于为和平目的对任何无核武器国家的核转让，并应在再转让控制的情况下适用于对任何国家的转让。为此，供应方已规定了出口触发清单。

禁止核炸药

2. 供应方只应在得到接受国政府正式保证，明确说明不包括将导致任何核爆炸装置的使用时，才批准触发清单所确定物项或相关技术的转让。

实物保护

3. (a) 经商定的触发清单中所确定的所有核材料和核设施均应置于有效的实物保护之下，以防止擅自使用和处理。供应方在考虑国际建议的情况下，已商定了应保证的与材料、设备和设施类型有关的实物保护级别。
(b) 在接受国中实施实物保护措施是该国政府的责任。但是，为了实施供应方之间商定的条款，这些措施必须依据的实物保护级别应当列入供应方和接受方之间的协议。
(c) 在每种情况下，均应为明确规定运输触发清单物项的责任作出具体安排。

保 障

4. (a) 供应方只应在下述情况下才向无核武器国家转让触发清单物项或相关技术，即接受国同原子能机构缔结的要求对其目前和未来和平活动中的一切源材料和特种可裂变材料实施保障的协定已生效。供应方只应在接受方作出下述正式的政府保证时才批准这类转让：
 - 如果上述协定应予终止，接受方将使根据原子能机构现行保障协定范本与原子能机构缔结的要求对供应方转让的、或与这类转让有关而加工、生产或使用的所有触发清单物项或相关技术实施保障的协定付诸生效；
 - 如果原子能机构决定原子能机构的保障已不再可能适用，供应方和接受方应制订适当的核查措施。如果接受方不接受这些措施，则应在供应方要求时允许归还所转让的和所衍生的触发清单物项。
(b) 只应在下述例外情况下才批准向没有此种保障协定的无核武器国家提供第 4(a)段所述的转让，即认为这种转让对于现有设施的安全运行必不可少并且已对这些设施实施保障。如果供应方打算批准或拒绝此种转让，则应进行通报，并在适当时进行磋商。

- (c) 第 4(a)和 4(b)段所述政策不适用于 1992 年 4 月 3 日或在此以前签署的协定或契约。对于 1992 年 4 月 3 日以后已宣布遵循或将宣布遵循 INFCIRC/254/Rev.1/Part 1 号文件的国家,该政策仅适用于在遵循之日以后签署的协定。
- (d) 在第 4(a)段所述政策不适用的协定(见第 4(b)和(c)段)的情况下,供应方只应在触发清单物项或相关技术已接受原子能机构的保障,且有关期限和范围符合原子能机构 GOV/1621 号文件规定时才作此种转让。但供应方应承诺力争尽早根据这类协定执行第 4(a)段所述政策。
- (e) 供应方保留将适用其他供应条件作为其国家政策的权利。

5. 适当时,供应方可联合重新考虑它们的共同保障要求。

对敏感出口的特别控制

6. 供应方在转让敏感设施、技术和核武器或其他核爆炸装置用材料时应谨慎。如转让浓缩或后处理设施、设备或技术,供应方应鼓励接受方同意供应国参与和/或其他多国适当地参与转让所得设施的工作,以此来代替国家工厂。供应方还应推动与地区性多国燃料循环中心有关的国际(包括原子能机构)活动。

对浓缩设施、设备和技术出口的特别控制

7. 在转让浓缩设施或其所用技术时,接受国应当同意,未经供应国同意既不设计也不运行转让的设施和以转让的技术为基础的任何设施来生产浓缩度高于 20%的浓缩铀,并应将此情况通知原子能机构。

对供应的或提取的核武器或其他核爆炸装置用材料的控制

8. 为了推进本准则的目标和提供进一步减少扩散危险的机会,在任何适当和实际可行的情况下,供应方均应将要求供应方和接受方之间共同商定对所涉核武器或其他核爆炸装置用任何材料的后处理、贮存、改变、使用、转让或再转让作出安排的条款,列入关于供应生产核武器或其他核爆炸装置用材料的核材料或设施的协定。

对再转让的控制

9. (a) 供应方只应在接受方作出下述保证时才转让触发清单物项或相关技术: 如果
- (1) 再转让这类物项或相关技术, 或
 - (2) 转让由供应方原先转让的设施得到的, 或在供应方原先转让的设备或技术的帮助下得到的触发清单物项,
- 则再转让或转让的接受方将提供与原转让供应方所要求的保证相同的保证。

- (b) 此外，应征得供应方同意才能进行下述再转让：
- (1) 按照本准则第 4(a)段，从不要求将全面保障作为供应条件的任何国家进行触发清单物项或相关技术的任何再转让和第 9(a)(2)段中提及的任何转让；
 - (2) 浓缩、后处理或重水生产设施、设备或相关技术的任何再转让以及由供应方原先转让的物项获得的同类设施或设备的任何转让；
 - (3) 重水或核武器或其他核爆炸装置用材料的任何再转让。
- (c) 为保证第 9(b)段所规定的同意权，将要求政府向政府就任何有关初始转让提供保证。
- (d) 如果由于接受方没有按照联合国安理会第 1540 号决议的规定建立和保持适当、有效的国家出口和转运控制而存在与第 9(a)段和第 9(c)段中作出的保证相反的再转让风险，供应方在转让触发清单中确定的物项和相关技术时应考虑限制措施。

防扩散原则

10. 尽管本准则有其他规定，供应方只应在确信进行触发清单中确定的物项或相关技术的转让不会助长核武器或其他核爆炸装置扩散或被转用于核恐怖主义行为时才批准进行这种转让。

实 施

11. 供应方应落实旨在确保有效实施本准则的法律措施，包括出口许可证审批条例、强制性措施和违约处罚。

支 助 活 动

实物保安

12. 供应方应交流实物保安信息，保护运输中的核材料以及收回被盗核材料和核设备，以促进实物保安领域的国际合作。供应方应促进最广泛地遵守各项国际文书，除其他外，特别是《核材料实物保护公约》，以及实施不时修订的 INFCIRC/225 号文件。供应方认识到这些活动和原子能机构的其他相关活动在防止核武器扩散和打击核恐怖主义威胁方面的重要性。

支持原子能机构的有效保障

13. 供应方应作出特别的努力，支持有效地实施原子能机构的保障。供应方还应支持原子能机构援助成员国改进其国家核材料衡算和控制系统以及提高保障的技术有效性的努力。

同样，鉴于技术发展和核设施数量的迅速增加，它们应当尽一切努力支持原子能机构进一步增强保障的充分性，并且支持旨在提高原子能机构保障有效性的适当的主动行动。

触发清单工厂的设计特点

14. 供应方应鼓励触发清单设施的设计者和制造者以便于实施保障和加强实物保护的方式建造这类设施，同时还要考虑恐怖分子袭击的危险。供应方应促进对触发清单装置设计资料的保护，并应向接受方强调保护这类资料的必要性。供应方也认识到在触发清单设施的设计和建造中包括安全和不扩散特点的重要性。

出口控制

15. 供应方应酌情向接受方强调对所转让的触发清单物项和相关技术以及从供应方原先转让的设施衍生的或借助供应方原先转让的设备或技术得到的触发清单物项实施联合国安理会第 1540 号决议所规定的出口控制的必要性。鼓励供应方向接受方提供援助，以酌情和切实可行地根据联合国安理会第 1540 号决议履行各自的义务。

磋商

16. (a) 供应方应通过正常渠道就有关执行本准则的事项保持接触和进行磋商。
- (b) 供应方只要认为恰当，应与其他有关政府就具体敏感事项进行磋商，以保证任何转让不致造成冲突或不稳定的危险。
- (c) 在不影响以下(d)分段至(f)分段的情况下：
- 如果一个或几个供应方认为，特别就爆炸核装置而言，已存在违反由本准则产生的供应方/接受方谅解的情况，或接受方非法终止或违反原子能机构保障，供应方应立即通过外交渠道磋商，以便确定和评估所称违反的实情和程度。还鼓励供应方在发现未向原子能机构申报的核材料或核燃料循环活动或某种核爆炸活动的情况下进行磋商。
 - 在这种磋商得出初步结果之前，供应方将不以可能不利于其他供应方或许会采取的有关它们当前同接受方接触的任何措施的方式行动。在第 16(c)段所述磋商进行期间，并在供应方商定适当的对策之前，每个供应方还应当考虑中止触发清单物项的转让。

- 一俟这类磋商得出结论，供应方应铭记《原子能机构规约》第十二条，商定可能包括终止对接受方核转让在内的适当对策和可能的行动。
- (d) 如果据原子能机构报告，接受方违反了其遵守保障协定的义务，则在原子能机构就此调查期间，供应方应考虑中止向当事国转让触发清单物项。就本段而言，“违反”仅指具有扩散关切的严重违反行为。
- (e) 供应方支持中止向违反其防止核扩散和保障义务的国家转让触发清单物项，并承认作出这类决定的责任和权利在国家政府或联合国安理会。这特别适用于原子能机构理事会采取下述任何行动的情况：
 - 按照《规约》第十二条 C 款，查悉接受方存在不遵守行为，或要求接受方采取特定行动以使其遵守保障义务；
 - 决定原子能机构不能核实要求接受保障的核材料没有被转用，包括因接受方所采取的行动而使原子能机构不能在当事国执行其保障任务的情况。

特别全体会议将在理事会采取行动的一个月内举行，供应方将在会议上审议有关情况，比较国家政策，并就适当对策作出决定。

- (f) 以上(e)分段的规定不适用于根据本准则第 4(b)段进行的转让。
17. 对本准则的任何修改包括由于第 5 段所述重新考虑而可能进行的任何修改，均需得到一致同意。

附件 A

准则中提及的触发清单

总 说 明

1. 不应由于零件的转让而排除这类控制对象。每一国政府为达到这一目的将采取其所能采取的行动，并将继续寻求所有供应方均能使用的关于零件的适用定义。
2. 参照准则第 9(b)(2)段，当设施的设计、建造或运行过程所依据的物理过程或化学过程与触发清单中确定的相同或相似时，该设施应被视为“同类”。

技 术 控 制

与本清单所列任何物项直接有关的“技术”转让将在国家法律允许的范围内经受与物项本身同等程度的详细审查和控制。

对“技术”转让的控制不适用于“在公共层面”的资料或“基础科学研究”。

除为核不扩散目的对“技术”转让进行控制外，供应方还应考虑恐怖分子袭击的危险，促进保护这类触发清单设施的设计、建造和运行技术，并应向接受方强调保护这类技术的必要性。

定 义

“技术”——系指本清单所列任何物项的“研制”、“生产”或“使用”所要求的特定资料。这种资料可以采用“技术数据”或“技术援助”的形式。

“基础科学研究”——主要为获得关于现象和可观察到的事实的基本原理的新知识而从事的实验性或理论性工作，此类工作主要不是针对某一具体的实际目的或目标。

“研制”——涉及“生产”前的各个阶段：

- 设计
- 设计研究
- 设计分析
- 设计概念
- 原型的装配和试验
- 小规模试验生产计划
- 设计数据
- 把设计数据转换成产品的过程
- 构形设计
- 总体设计
- 配置

“在公共层面”——本清单所述的“在公共层面”系指已经获得的技术，而对其进一步转用可以不加限制。（版权限制并不排除使用在公共层面的技术。）

“生产”——系指下述各生产阶段：

- 建造
- 生产工程
- 制造
- 合成
- 组装（装配）
- 检查
- 试验
- 质量保证

“技术援助”——技术援助可以采用下述形式：规程、特殊技术、培训。操作知识和咨询服务。

说明：“技术援助”可以包括“技术数据”的转让。

“技术数据”——“技术数据”可以采用下述形式：蓝图、平面图、图表、模型、公式、工程设计和技术规格、手册以及诸如磁盘、磁带、只读存储器等其他媒体或器件上所写入的或记录的规程。

“使用”——系指运行、安装（包括现场安装）、维护（校核）、修理、大修和整修。

材料和设备

1. 源材料和特种可裂变材料

按《国际原子能机构规约》第二十条所定义：

1.1. “源材料”

“源材料”一词系指含有自然界中同位素混合物的铀；贫同位素 235 的铀；钚；呈金属、合金、化合物或浓缩物形态的上述各项材料；含有达到理事会随时确定含量的上述一种或数种材料的任何其他材料；由理事会随时确定的其他材料。

1.2. “特种可裂变材料”

- i) “特种可裂变材料”一词系指钚-239；铀-233；富集了同位素 235 或 233 的铀；含有一种或数种上述材料的任何材料以及理事会随时确定的其他可裂变材料；但“特种可裂变材料”一词不包括源材料在内。
- ii) “富集了同位素 235 或 233 的铀”一词系指含有同位素 235 或 233 或兼含二者的铀，而这些同位素的总丰度与同位素 238 的丰度比大于自然界中的同位素 235 与同位素 238 的丰度比。

但是，对于本准则而言，不应包括以下(a)分段指明的物项，和向某一接受国在 12 个月期间内出口低于以下(b)分段规定限额的源材料或特种可裂变材料：

- (a) 同位素钚-238 浓度超过 80%的钚。

用作仪器传感元件在克量或克量以下的特种可裂变材料；

政府确信仅用于非核活动，例如用于生产合金或陶瓷的源材料。

- (b) 特种可裂变材料 50 有效克；
 天然铀 500 千克；
 贫化铀 1000 千克；
 钚 1000 千克。

2. 设备和非核材料

政府采用的设备和非核材料物项的名称如下（低于附件 B 中指出的水平的量可看作无实际意义）：

- 2.1. 核反应堆以及专门为其设计和制造的设备和部件（见附件 B，第 1 段）；
- 2.2. 反应堆用非核材料（见附件 B，第 2 段）；
- 2.3. 辐照燃料元件后处理厂以及专门为其设计或制造的设备（见附件 B，第 3 段）；
- 2.4. 核反应堆燃料元件制造厂以及专门为其设计或制造的设备（见附件 B，第 4 段）；
- 2.5. 铀同位素分离厂以及专门为其设计或制造的除分析仪器外的设备（见附件 B，第 5 段）；
- 2.6. 生产或浓缩重水、氘和氚化物的工厂以及专门为其设计或制造的设备（见附件 B，第 6 段）；
- 2.7. 分别按照第 4 段和第 5 段的规定可用于制造燃料元件和铀同位素分离的铀和钚的转化厂以及专门为其设计或制造的设备（见附件 B，第 7 段）。

附件 B 触发清单物项的说明

(附件 A 材料和设备第 2 段中指明的物项)

1. 核反应堆以及专门为其设计和制造的设备和部件

1.1. 整座反应堆

能够运行以便保持受控自持链式裂变反应的核反应堆，但不包括零功率反应堆，零功率堆定义为设计的钚最大生产率每年不超过 100 克的反应堆。

注释

一个“核反应堆”基本上包括反应堆容器内或直接安装在其上的物项、控制堆芯功率水平的设备和通常含有或直接接触或控制反应堆堆芯一次冷却剂的部件。

不打算把那些能适当地加以改进使每年产钚量大大超过 100 克的反应堆排除在外。为在较高功率水平下持续运行而设计的反应堆，无论其产钚能力如何都不被认为是“零功率反应堆”。

出口

只能根据准则的程序出口此范围内的全套重要物项。在此按功能定义的范围内只能根据准则程序出口的那些单个物项列在第 1.2.到 1.10.段。政府保留对此按功能定义的范围内其他物项适用准则程序的权利。

1.2. 核反应堆压力容器

金属容器，或工厂为其预制的主要部件，是专门设计或制造用来容纳上述第 1.1.段定义的核反应堆的堆芯以及以下第 1.8 段定义的堆内部件。

注释

物项 1.2.包括反应堆压力容器的顶盖，它是工厂预制的压力容器的主要部件。

1.3. 核反应堆燃料装卸机

专门设计或制造用于对上述第 1.1.段所定义的核反应堆插入或从中取出燃料的操作设备。

注释

以上所述的物项能进行负载操作或利用技术上先进的定位或准直装置以便允许进行复杂的停堆装料操作（例如通常不可能直接观察或接近燃料的操作）。

1.4. 核反应堆控制棒和设备

专门设计或制造用于控制上述第 1.1.段所定义的核反应堆的裂变过程的棒、供其所用的支承结构或悬吊结构、棒驱动机构或控制棒导管。

1.5. 核反应堆压力管

专门设计或制造用于容纳上述第 1.1.段所定义的反应堆的燃料元件和一次冷却剂的压力管，工作压力超过 50 个大气压。

1.6. 锆管

专门设计或制造供上述第 1.1.段所定义的反应堆中使用的，任何收货国在任何 12 个月期间数量超过 500 千克，而且其中铪与锆之重量比低于 1:500 的锆金属和合金管或管组件。

1.7. 一次冷却剂泵

专门设计或制造用于循环上述第 1.1.段所定义的核反应堆用一次冷却剂的泵。

注释

专门设计或制造的泵可包括防止一次冷却剂渗漏的精密密封或多重密封的系统、全密封驱动泵，及有惯性质量系统的泵。这一定义包括鉴定为《美国机械工程师协会标准》第三章第一段 NB 分段（1 类部件）或相当标准的泵。

1.8. 核反应堆内部件

专门设计或制造供上述第 1.1.段定义的核反应堆中使用的“核反应堆内部件”，包括“堆芯用支承柱、燃料管道、热屏蔽层、挡板、堆芯栅格板、扩散板”。

注释

“核反应堆内部件”是反应堆压力容器内的主要构件。它们有一种或多种功用，例如：支承堆芯、保持燃料准直、限定一次冷却剂流动方向，为反应堆压力容器提供辐射屏蔽和引导堆芯内测量仪表。

1.9. 热交换器

专门设计和制造用于上述第 1.1.段所定义的核反应堆的一次冷却剂回路的热交换器（蒸汽发生器）。

注释

蒸汽发生器是为把反应堆（一次侧）内产生的热传递给给水（二次侧）以产生蒸汽而专门设计和制造的。对于液态金属快中子增殖反应堆还有中间液态金属冷却剂回路在这种情况下除蒸汽发生器外还认为把热从一次侧传递给中间冷却剂回路的热交换在控制范围内。这一条的控制范围不包括事故冷却系统或衰变热冷却系统的热交换器。

1.10. 中子探测和测量仪器仪表

专门设计或制造用于测定上述第 1.1.段所定义的核反应堆的堆芯内中子通量水平的中子探测和测量仪器仪表。

注释

这一条的范围包括测量大范围通量水平的堆芯内和堆芯外仪器仪表典型范围从每平方厘米每秒 10^4 个中子到每平方厘米每秒 10^{10} 个中子或 10^{10} 个中子以上。堆芯外系指上述第 1.1.段定义的反应堆的堆芯外但安装在生物屏蔽范围内的那些仪器仪表。

2. 反应堆用非核材料

2.1. 氘和重水

任何收货国在任何 12 个月期间内收到的供上述第 1.1.段所定义的核反应堆用，数量超过 200 千克氘原子的氘、重水（氧化氘）以及氘与氢原子之比超过 1:5000 的任何其他氘化物。

2.2. 核级石墨

任何收货国在任何 12 个月期间内收到的数量超过 30 吨，纯度高于百万分之五硼当量，密度大于 1.50 克/立方厘米的石墨。

注释

为出口控制目的，政府将确定，出口符合上述技术规格的石墨是否供核反应堆使用。

硼当量可由实验确定或按对包括硼在内的杂质硼当量_Z（不包括硼当量_碳，因为认为碳不是杂质）求和计算，其中：

硼当量_Z（ppm）=CF_X元素 Z 的浓度（ppm）；

CF是转换因子：（ $\sigma_Z \times A_B$ ）除以（ $\sigma_B \times A_Z$ ）；

σ_B 和 σ_Z 分别是天然硼和元素 Z 的热中子俘获截面（靶）；而 A_B 和 A_Z 分别是天然硼和元素 Z 的原子质量。

3. 辐照燃料元件后处理厂以及专门为其设计或制造的设备

按语

辐照核燃料经后处理能从强放射性裂变产物以及其他超铀元素中分离铀和钍。有各种技术工艺流程能够实现这种分离。但是，多年来，“普雷克斯”已成为最普遍采用和接受的工艺流程。“普雷克斯”流程包括：将辐照核燃料溶解在硝酸中，接着通过利用磷酸三丁酯与一种有机稀释剂的混合剂的溶剂萃取法分离铀、钍和裂变产物。

“普雷克斯”设施彼此的流程功能相似，包括：辐照燃料元件的切割、燃料溶解、溶剂萃取和工艺液流的贮存。还可能有种种设备，用于：使硝酸铀酰热脱硝，把硝酸铀转化成氧化铀或金属铀，以及把裂变产物的废液处理成适合于长期贮存或处置的形式。但是，执行这些功能的设备的类型和结构在各个“普雷克斯”设施间可能不同，原因有几个，其中包括需要后处理的辐照核燃料的类型和数量、打算对回收材料的处理和设施设计时所考虑的安全和维修原则。

一个“辐照燃料元件后处理厂”包括通常直接接触和直接控制辐照燃料和主要核材料以及裂变产物工艺液流的设备和部件。

可以通过采取的各种避免临界（例如通过几何形状）、辐射照射（例如通过屏蔽）和毒性危险（例如通过安全壳）的措施来确定这些过程，包括铀转换和铀金属生产的完整系统。

出口

只有按照准则的程序才能在此范围内进行整套重要物项的出口。

政府保留将准则的程序适用于以下所列按功能定义的范围内其他物项的权利。

可以认为属于为辐照燃料元件后处理“专门设计或制造的设备”这一概念范围的设备项目包括：

3.1. 辐照燃料元件切割机

按语

这种设备能切开燃料包壳，使辐照核材料能够被溶解。专门设计的金属切割机是最常用的，当然也可能采用先进设备，例如激光器。

专门设计或制造为以上确定的后处理厂用来切、割或剪辐照燃料组件、燃料棒束或棒的遥控设备。

3.2. 溶解器

按语

溶解器通常接受切碎了的乏燃料。在这种临界安全的容器内，辐照核材料被溶解在硝酸中，而剩余的壳片从工艺液流中被去掉。

专门设计或制造供以上确定的后处理厂用于溶解辐照核燃料，并能承受热、腐蚀性强的液体以及能远距离装料和维修的在临界安全的容器（例如小直径的环形或平板式容器）。

3.3. 溶剂萃取器和溶剂萃取设备

按语

溶剂萃取器既接受溶解器中出来的辐照燃料的溶液，又接受分离铀、钚和裂变产物的有机溶液。溶剂萃取设备通常设计来满足严格的运行参数，例如很长的运行寿命，不需要维修或充分便于更换、操作和控制简便以及可适应工艺条件的各种变化。

专门设计或制造用于辐照燃料后处理厂的溶剂萃取器，例如填料塔或脉冲塔、混合澄清器或离心接触器。溶剂萃取器必须能耐硝酸的腐蚀作用。溶剂萃取器通常由低碳不锈钢、钛、锆或其他优质材料，按极高标准（包括特种焊接和检查以及质量保证和质量控制技术）加工制造而成。

3.4. 化学溶液保存或贮存容器

按语

溶剂萃取阶段产生三种主要的工艺液流。进一步处理所有这三种液流所用的保存或贮存容器如下：

- (a) 用蒸发法使纯硝酸铀酰溶液浓缩，然后使其进到脱硝过程，并在此过程中转变成氧化铀。这种氧化物再次在核燃料循环中使用。
- (b) 通常用蒸发法浓缩强放射性裂变产物溶液，并以浓缩液形式贮存。随后可蒸发这种浓缩液并将其转变成适合于贮存或处置的形式。
- (c) 在将纯硝酸钚溶液转到下几个工艺步骤前先将其浓缩并贮存。尤其是，钚溶液的保存或贮存容器要设计得能避免由于这种液流浓度和形状的改变导致的临界问题。

专门设计或制造为辐照燃料后处理厂用的保存或贮存容器。这种保存或贮存容器必须能耐硝酸的腐蚀作用。保存或贮存容器通常用低碳不锈钢、钛或锆或其

他优质材料制造。可将保存或贮存容器设计成能远距离操作和维修，而且它们可具有下述控制核临界的特点：

- (1) 壁或内部结构至少有百分之二的硼当量，或
- (2) 对于圆柱状容器来说，最大直径 175 毫米（7 英寸），或
- (3) 对于平板式或环形容容器来说，最大宽度 75 毫米（3 英寸）。

4. 核反应堆燃料元件制造厂以及专门为其设计或制造的设备

按语

核燃料元件是由本附件材料和设备所述一种或几种源材料或特种可裂变材料制成的。对于最普通燃料类型的氧化物燃料而言，会有压制芯块、烧结、研磨和分级等设备。混合氧化物燃料在手套箱（或与其相当的密封容器）内进行操作直至燃料被密封到包壳中。在所有情况下，燃料被密封在适当的包壳内，这种包壳是设计成包容燃料的主要包壳，在反应堆运行期间提供适当的性能和安全。此外，在所有情况下必须对过程、程序和设备按极高标准进行准确控制，以便保证燃料具有可预测和安全的性能。

注释

认为属于为燃料元件制造厂“专门设计或制造”这句话所指范围内的设备项目包括：

- (a) 通常直接接触、或直接加工或控制核材料生产流程的设备；
- (b) 将核材料封入包壳中的设备；
- (c) 检查包壳和密封的完整性的设备；
- (d) 检查密封燃料最后处理的设备。

这种设备或设备系统可包括，例如：

- 1) 为检查燃料芯块的最终尺寸和表面缺陷而专门设计或建造的全自动芯块检查站；
- 2) 为把端帽焊接到燃料元件细棒（或棒）上专门设计或制造的自动焊接机；
- 3) 为检查完成的燃料元件细棒（或元件棒）的完整性专门设计或建造的自动化试验和检查站。

第 3 项中典型的设备包括：a) 燃料元件细棒（或元件棒）端帽焊缝 X 射线检查用设备，b) 加压燃料元件细棒（或元件棒）的氦检漏设备和 c) 对燃料元件细棒（或元件棒）作 γ 射线扫描以检查内部燃料芯块正确填充的设备。

5. 铀同位素分离厂以及专门为其设计或制造的除分析仪器外的设备

可以认为属于为铀同位素分离“专门设计或制造的（除分析仪器外）的设备”这一概念范围的设备项目包括：

5.1. 气体离心机和专门设计或制造用于气体离心机的组件和构件

按语

气体离心机通常由一个（几个）直径在 75 毫米（3 英寸）和 400 毫米（16 英寸）之间的薄壁圆筒组成。圆筒处在真空环境中并且以大约 300 米/秒或更高的线速度旋转，旋转时其中轴线保持垂直。为了达到高的转速，旋转构件的结构材料必须具有高的强度/密度比，而转筒组件因而及其单个构件必须按高精度公差来制造以便使不平衡减到最小。与其他离心机不同，为浓缩铀用的气体离心机的特点是：在转筒室中有一个（几个）盘状转板和一个固定的管列用来供应和提取六氟化铀气体，其特点是至少有三个单独的通道，其中两个通道与从转筒轴向转筒室周边伸出的收集器相连。在真空环境中还有一些不转动的关键物项，它们虽然是专门设计的，但不难制造，也不是用独特的材料制造。不过，一个离心机设施需要大量的这种构件，因此其数量能提供最终应用的重要迹象。

5.1.1. 转动部件

(a) 完整的转筒组件：

用本段**注释**中所述的一种或一种以上高强度/密度比的材料制造成的若干薄壁圆筒或一些相互连接的薄壁圆筒；如果是相互连接的，则圆筒通过以下 5.1.1.(c)段中所述的弹性波纹管或环连接。转筒（如果是最终形式的话）装有以下第 5.1.1.(d)和(e)段所述内档板和端盖。但是完整的组件只能以部分组装形式交货。

(b) 转筒：

专门设计或制造的厚度为 12 毫米（0.5 英寸）或更薄直径在 75 毫米（3 英寸）和 400 毫米（16 英寸）之间，用本段**注释**中所述一种或一种以上高强度/密度比材料制造成的薄壁圆筒。

(c) 环或波纹管：

专门设计或制造用于局部支承转筒管或把数个转筒管连接起来的构件。波纹管是壁厚 3 毫米（0.12 英寸）或更薄，直径在 75 毫米（3 英寸）和 400 毫米（16 英寸）之间，用本段**注释**中所述一种或一种以上高强度/密度比材料制成的有褶短圆筒。

(d) 转盘:

专门设计或制造的直径在 75 毫米（3 英寸）和 400 毫米（16 英寸）之间，用本段注释中所述各种高强度/密度比材料之一制造成的安装在离心机转筒内的盘状构件，其作用是将排气室与主分离室隔开，在某些情况下帮助六氟化铀气体在转筒的主分离室中循环。

(e) 顶盖/底盖:

专门设计或制造的直径在 75 毫米（3 英寸）和 400 毫米（16 英寸）之间，用本段注释中所述各种高强度/密度比材料之一制造成的装在转筒管端部的盘状构件，这样就把六氟化铀包容在转筒管内，在有些情况下还作为一个被结合的部分支承、保持或容纳上轴承件（顶盖）或支持马达的旋转件和下轴承件（底盖）。

注释

离心机转动构件所用材料是:

- (a) 极限抗拉强度为 2.05×10^9 牛顿/平方米（300 000 磅/平方英寸）或更高的马氏体钢；
- (b) 极限抗拉强度为 0.46×10^9 牛顿/平方米（67 000 磅/平方英寸）或更高的铝合金；
- (c) 适合于复合结构用的纤维材料，其比模量应为 3.18×10^6 米或更高，比极限抗拉强度应为 7.62×10^4 米或更高（“比模量”是用牛顿/平方米表示的杨氏模量除以用牛顿/立方米表示的比重；“比极限抗拉强度”是用牛顿/平方米表示的极限抗拉强度除以用牛顿/立方米表示的比重）。

5.1.2. 静态部件

(a) 磁悬浮轴承:

专门设计或制造的轴承组合件，由悬浮在充满阻尼介质箱中的一个环形磁铁组成。该箱要用耐六氟化铀的材料（见 5.2.段的注释）制造。该磁铁与装在 5.1.1.(e)段所述顶盖上的一个磁极片或另一个磁铁相组合。此磁铁可以是环形的，外径与内径的比小于或等于 1.6:1。它的初始磁导率可以是 0.15 亨/米（120 000 厘米·克·秒制单位）或更高，或剩磁 98.5%或更高，或产生的能量高于 80 千焦耳/立方米（ 10^7 高斯-奥斯特）。除了具有通常的材料性质外，先决条件是磁轴对几何轴的偏离应限制在很小的公差范围（低于 0.1 毫米或 0.004 英寸）或特别要求磁铁材料有均匀性。

(b) 轴承/阻尼器:

专门设计或制造的架在阻尼器上的具有枢轴/盖的轴承。枢轴通常是一种淬硬钢轴，一端精加工成半球，而另一端能连在 5.1.1.(e) 段所述底盖上。但是这种轴可附有一个动压轴承。盖是球形的，一面有一个半球形陷穴。这些构件通常是单独为阻尼器提供的。

(c) 分子泵:

专门设计或制造的内部有已加工或挤压的螺纹槽和已加工的腔的泵体。典型尺寸如下：内直径 75 毫米（3 英寸）到 400 毫米（16 英寸），壁厚 10 毫米（0.4 英寸）或更厚，长度等于或大于直径。刻槽的横截面是典型的矩形，槽深 2 毫米（0.08 英寸）或更深。

(d) 电动机定子:

专门设计或制造的环形定子，用于在真空中频率范围为 600—2000 赫，功率范围为 50—1000 伏安条件下同步运行的高速多相交流磁滞（或磁阻）式电动机。定子由在典型厚度为 2.0 毫米（0.08 英寸）或更薄一些的薄层组成的低损耗叠片铁芯上的多相绕组组成。

(e) 离心机壳/收集器:

专门设计或制造用来容纳气体离心机的转筒组件的部件。离心机壳由一个壁厚达 30 毫米（1.2 英寸）的刚性圆筒组成，它带有经过精密机械加工的两个端面以便固定轴承和一个或多个便于安装的法兰盘。这两个经过机械加工的端面相互平行，并以不大于 0.05 度的误差与圆筒轴垂直。离心机壳也可是一种格状结构以适应几个转筒。这种机壳通常用耐六氟化铀腐蚀的材料制造或是用这类材料加以保护。

(f) 收集器:

专门设计或制造的内径达 12 毫米（0.5 英寸）的一些管件，它们用来借助皮托管作用（即利用一个例如扳弯径向配置的管的端部而形成的面迎转筒内环形气流的开口）从转筒内部提取六氟化铀气体，并且能与中心气体提取系统相连。这类管件用耐六氟化铀腐蚀的材料制造或用这类材料加以保护。

5.2. 为气体离心浓缩工厂专门设计或制造的辅助系统、设备和部件

按语

气体离心浓缩工厂用的辅助系统、设备和部件是向离心机供应六氟化铀，把单个离心机相互连接起来以组成级联（多级）从而逐渐提高浓缩度并且从离心机中提取六氟化铀“产品”和“尾料”所需工厂的各种系统，再加上驱动离心机或控制该工厂所需要的设备。

通常利用经加热的高压釜将六氟化铀从固体蒸发，气态形式的六氟化铀通过级联集管线路被分配到各个离心机。通过级联集管线路使从离心机流出的六氟化铀“产品”和“尾料”气流通到冷阱（在约 203 开（-70 摄氏度）下工作），气流在冷阱先冷凝，然后再送入适当的容器以便运输或贮存。由于一个浓缩工厂由排成级联式的好几千个离心机组成，所以级联的集管线路有好几公里长，含有好几千条焊缝而且管道布局大量重复。上述设备、部件和管道系统都是按非常高的真空和净度标准制造的。

5.2.1. 供料系统/产品和尾料提取系统

专门设计或制造的流程系统包括：

供料釜（或供料器），用于以高达 100 千帕（15 磅/平方英寸）的压力和 1 千克/小时（或更大）的速率使六氟化铀通向离心机级联；

凝华器（或冷阱），用于以高达 3 千帕（0.5 磅/平方英寸）的压力从级联中取出六氟化铀。凝华器能被冷却到 203 开（-70 摄氏度）和加热到 343 开（70 摄氏度）；

“产品”和“尾料”器，用来把六氟化铀收集到容器中。

这种设施、设备和管路全部用耐六氟化铀的材料制成或用作衬里（见本段的注释），并且按很高的真空和净度标准制造。

5.2.2. 机械集管系统

专门设计或制造用于在离心机级联中操作六氟化铀的管路系统和集管系统。管路网络通常是“三头”集管系统，每个离心机连接一个集管头。这样，在形式上有大量重复。所有的都用耐六氟化铀的材料（见本段注释）制成并且按很高的真空和净度标准制造。

5.2.3. 六氟化铀质谱仪/离子源

专门设计或制造的磁质谱仪或四极质谱仪，这两种谱仪能从六氟化铀气流中“在线”取得供料、产品或尾料的样品，并且具有以下所有特点：

1. 原子质量单位的单位分辨率高于 320；
2. 离子源用尼赫罗姆合金或蒙乃尔合金制成或以这些材料作为衬里或镀镍；
3. 电子轰击离子源；
4. 有一个适合于同位素分析的收集系统。

5.2.4. 频率变换器

为满足 5.1.2.(d)中定义的电机定子的需要而专门设计或制造的频率变换器（又称变频器或变换器）或这类频率变换器的部件、构件和子配件。它们具有下述所有特点：

1. 多相输出 600—2000 赫；
2. 高稳定性（频率控制优于 0.1%）；
3. 低谐波畸变（低于 2%）；
4. 效率高于 80%。

注释

以上所列物项不是直接接触六氟化铀流程气体就是直接控制离心机和直接控制这种气体从离心机到离心机以及从级联到级联的通路。

耐六氟化铀腐蚀的材料包括不锈钢、铝、铝合金、镍或含镍 60%以上的合金。

5.3. 专门设计或制造用于气体扩散法浓缩的组件和部件

按语

用气体扩散法分离铀同位素时，主要的技术组件是一个特制的多孔气体扩散膜、用于冷却（经压缩过程所加热）气体的热交换器、密封阀和控制阀以及管道。由于气体扩散技术使用的是六氟化铀（六氟化铀），所有的设备、管道和仪器仪表（与气体接触的）表面都必须用同六氟化铀接触时能保持稳定的材料制成。一个气体扩散设施需要许多这样的组件，因此其数量能提供最终用途的重要迹象。

5.3.1. 气体扩散膜

- (a) 专门设计或制造的由耐六氟化铀腐蚀的金属、聚合物或陶瓷材料制成的，很薄的多孔过滤膜，孔的大小为 100—1000（埃），膜厚 5 毫米（0.2 英寸）（或以下），对于管状膜来说，直径为 25 毫米（1 英寸）（或以下）；
- (b) 为制造这种过滤膜而专门制备的化合物或粉末。这类化合物和粉末包括镍或含镍 60%（或以上）的合金、氧化铝或纯度 99.9%（或以上）的耐六氟化铀的完全氟化的烃聚合物，颗粒大小低于 10 微米。颗粒大小高度均匀。这些都是专门为制造气体扩散膜准备的。

5.3.2. 扩散室

专门设计或制造的直径大于 300 毫米（12 英寸），长度大于 900 毫米（35 英寸）的密闭式圆柱形容器或尺寸相当的方形容器；该容器有直径都大于 50 毫米（2 英寸）的一个进气管和两个出气管，容器用于容纳气体扩散膜，由耐六氟化铀的材料制成或以其作为衬里，并且设计卧式或垂直安装。

5.3.3. 压缩机和鼓风机

专门设计或制造的轴向离心式压缩机或正排量压缩机或鼓风。压缩机或鼓风机吸气能力为 1 立方米六氟化铀/分（或更大），出口压力高达几百千帕（100 磅/平方英寸），设计成在具有或没有适当功率的电动机的六氟化铀环境中长期运行。这种压缩机和鼓风机的压力比在 2:1 和 6:1 之间，用耐六氟化铀的材料制成或用其作为衬里。

5.3.4. 转动轴封

专门设计或制造的真空密封装置，有密封式进气口和出气口，用于密封把压缩机或鼓风机转子同传动马达连接起来的转动轴，以保证可靠的密封，防止空气渗入充满六氟化铀的压缩机或鼓风机的内腔。这种密封装置通常设计成将缓冲气体泄漏率限制到小于 1000 立方厘米/分（60 立方英寸/分）。

5.3.5. 冷却六氟化铀的热交换器

专门设计或制造的，用耐六氟化铀的材料（不锈钢除外）制成或以其作为衬里或以铜或这些金属的复合物作衬里的热交换器，在压差为 100 千帕（15 磅/平方英寸）下渗透压力变化率小于每小时 10 帕（0.0015 磅/平方英寸）。

5.4. 专门设计或制造的用于气体扩散浓缩的辅助系统、设备和部件

按语

气体扩散浓缩工厂用的辅助系统、设备和部件，是向气体扩散组件供应六氟化铀，把单个组件相互联结组成级联（或多级）以便使浓缩度逐步增高并且从各个扩散级联中提取六氟化铀“产品”和“尾料”所需要的工厂系统。由于扩散级联的很高惯性，级联运行的任何中断，特别是停车，会导致严重后果。因此，在所有工艺系统中严格、持续地保持真空、自动防止事故、准确自动调节气流对气体扩散工厂是很重要的。所有这一切，使得该工厂需要装备大量特别的测量、调节和控制系统。

通常六氟化铀从置于高压釜内的圆筒中蒸发，以气态经级联集管管路通到进口。从出口流出的六氟化铀“产品”和“尾料”气流通过级联集管管路通到冷阱或压缩装置，六氟化铀气体在这里液化，然后再进到适当的容器以便运输或贮存。由于一个气体扩散浓缩工厂由排成级联式的无数个气体扩散组件组成，所以级联的集管管线有好几公里长，含有好几千条焊缝而且管道布局大量重复。上述设备、部件和管道系统都按非常高的真空和净度标准制造。

5.4.1. 供料系统/产品和尾料提取系统

专门设计或制造的能在 300 千帕（45 磅/平方英寸）或以下的压力下运行的流程系统，包括：

供料釜（或供料系统），用于使六氟化铀通向气体扩散级联；

凝华器（或冷阱），用于从扩散级联中取出六氟化铀；

液化器，将来自级联的六氟化铀气体压缩并冷凝成液态六氟化铀；

“产品”或“尾料”器，用来把六氟化铀收集到容器中。

5.4.2. 集管管路系统

专门设计或制造用于在气体扩散级联中操作六氟化铀的管路系统和集管系统。这种管路网络通常是“双头”集管系统，每个扩散单元连接一个集管头。

5.4.3. 真空系统

(a) 专门设计或制造的大型真空歧管、真空集管和抽气能力为 5 立方米/分（或以上）的真空泵。

- (b) 专门设计的在含六氟化铀气氛中使用的真空泵，用铝、镍或含镍量高于 60% 的合金制成或以其作为衬里。这些泵可以是旋转式或正压式，可有排代式密封和碳氟化合物密封并且可以存在有特殊工作液体。

5.4.4. 特种关闭阀和控制阀

专门设计和制造的，由耐六氟化铀材料制成，直径 40 至 1500 毫米（1.5 至 59 英寸）可手动或自动的关闭阀和控制波纹管阀；用来安装在气体扩散浓缩工厂的主要和辅助系统中。

5.4.5. 六氟化铀质谱仪/离子源

专门设计或制造的磁质谱仪或四极质谱仪，这些谱仪能从六氟化铀气流中“在线”取得供料、产品或尾料的样品，并且具有以下所有特点：

1. 原子质量单位的单位分辨率高于 320；
2. 离子源用尼赫罗姆合金或蒙乃尔合金制成或以这些材料作为衬里或镀镍；
3. 电子轰击离子源；
4. 有一个适合于同位素分析的收集系统。

注释

以上所列物项不是直接接触六氟化铀流程气体就是直接控制级联中的气流。所有接触流程气体的表面都要完全由耐六氟化铀材料制成或以其作为衬里。对于与气体扩散物项有关的本段来说，耐六氟化铀腐蚀的材料包括不锈钢、铝、铝合金、氧化铝、镍或含镍 60% 以上的合金以及耐六氟化铀的完全氟化的烃聚合物。

5.5. 专门设计或制造用于气动浓缩厂的系统、设备和部件

按语

在气动浓缩过程中，要压缩气态六氟化铀和轻气体（氢或氦）的混合气，然后使其通过分离元件。在这些元件中，通过在一个曲壁几何结构面上产生的高离心力，完成同位素分离。已经成功地开发了这种类型的两个过程：喷嘴分离过程和涡流管过程。就这两种过程而言，一个分离级的主要部件包括容纳专用分离元件（喷嘴或涡流管）的圆筒状容器、气体压缩机和用来移出压缩热的热交换器。一座气动浓缩工厂需要若干个这种分离级：因此其数量能提供最终用途的重要迹象。由于气动过程使用六氟化铀，所有设备、管线和仪器仪表中与这种气体接触的表面，都必须用同六氟化铀接触时能保持稳定的材料制成。

注释

本段所列物项不是直接接触六氟化铀过程气体就是直接控制级联中的这种气流。所有与六氟化铀这种过程气体接触的表面，均需用耐六氟化铀材料制造或用耐六氟化铀材料保护。就本段有关气动浓缩物项而言，能耐六氟化铀腐蚀的材料包括：铜、不锈钢、铝、铝合金、镍或含镍 60%或 60%以上的合金；和耐六氟化铀完全氟化的烃聚合物。

5.5.1. 分离喷嘴

专门设计或制造的分离喷嘴及其组件。分离喷嘴由一些狭缝状、曲率半径小于 1 毫米（一般为 0.1 毫米至 0.05 毫米）的耐六氟化铀腐蚀的弯曲通道组成，喷嘴中有一刀口能将流过该喷嘴的气体分成两部分。

5.5.2. 涡流管

专门设计或制造的涡流管及其组件。涡流管呈圆筒形或锥形，用耐六氟化铀腐蚀材料制成或加以保护，其直径在 0.5 厘米至 4 厘米之间，长径比率为 20:1 或更小，并带有 1 个或多个切向进口。这些涡流管的一端或两端装有喷嘴型附件。

注释

供料气体在涡流管的一端切向进入涡流管，或通过一些旋流叶片，或从沿涡流管周边分布的若干个切向位置进入涡流管。

5.5.3. 压缩机和鼓风机

专门设计或制造的用耐六氟化铀腐蚀材料制成或加以保护的轴向离心式或正排量压缩机或鼓风机其体积吸入能力为 2 立方米/分或更大的六氟化铀/载体气（氢或氦）混合气。

注释

这些压缩机和鼓风机的压力比一般在 1.2:1 和 6:1 之间。

5.5.4. 转动轴封

专门设计或制造的带有密封式进气口和出气口的转动轴封，用作密封与压缩机或鼓风机转子连接起来驱动马达的轴，以便保证可靠的密封，防止过程气体外漏或空气或密封气体内漏入充满六氟化铀/载气混合气的压缩机或鼓风机内腔。

5.5.5. 冷却气体用热交换器

专门设计或制造的用耐六氟化铀腐蚀材料制成或加以保护的热交换器。

5.5.6. 分离元件外壳

专门设计或制造的用耐六氟化铀腐蚀的材料制成或加以保护的用作容纳涡流管或分离喷嘴的分离元件外壳。

注释

这种外壳可以是直径大于 300 毫米长度大于 900 毫米的圆筒状容器，或是与上述相近尺寸的矩形容器，并可设计成便于水平安装或竖直安装的形式。

5.5.7. 供料系统/产品和尾料提取系统

专门为浓缩工厂设计或制造的用耐六氟化铀腐蚀材料制成的或加以保护的流程系统或，包括：

- (a) 供料高压釜、供料加热炉或供料系统，用作把六氟化铀送入浓缩过程；
- (b) 凝华器（或冷阱），用于从浓缩过程中移出六氟化铀，供下一步加热转移；
- (c) 固化器或液化器，用于通过压缩六氟化铀并将其转化为一种液态形式或固态形式，从浓缩流程中移出六氟化铀；
- (d) “产品”器和“尾料”器，用于将六氟化铀转移入各容器中。

5.5.8. 集管管路系统

专门为操作气动级联中的六氟化铀设计或制造的用耐六氟化铀腐蚀材料制成或保护的集管管路系统。这种管路系统通常是“双头”集管系统，每级或每个级组连接一个集管头。

5.5.9. 真空系统和泵

- (a) 为在含六氟化铀气氛中工作而专门设计或制造的吸入能力为 5 立方米/分或更大的由若干真空歧管、真空集管和真空泵组成的真空系统，
- (b) 为在含六氟化铀气氛中工作而专门设计或制造的，用耐六氟化铀腐蚀的材料制成或保护的真空泵。这些泵也可用氟碳密封和特殊工作流体。

5.5.10. 特种截流阀和控制阀

为安装在气动浓缩工厂的主要和辅助系统而专门设计或制造的，用耐六氟化铀腐蚀材料制成的或保护的，直径为 40—1500 毫米的可手动或自动截流阀和控制波纹管阀。

5.5.11. 六氟化铀质谱仪/离子源

专门设计或制造的磁质谱仪或四极质谱仪，这些谱仪能从六氟化铀气流中“在线”取得供料、产品或尾料的样品，并且具有所有以下特点：

- 1. 质量的单位分辨率高于 320；
- 2. 用尼赫罗姆合金或蒙乃尔合金制成或以这些材料为衬里或镀镍的离子源；
- 3. 电子轰击离子源；
- 4. 适合于同位素分析的收集器系统。

5.5.12. 六氟化铀/载体气分离系统

为将六氟化铀与载体气（氢或氦）分离开来而专门设计或制造的过程系统。

注释

这些系统是为将载体气中的六氟化铀含量降至 1 ppm 或更低而设计的，并可含有下述的设备：

- (a) 能以-120 摄氏度或更低温度工作的低温热交换器和低温分离器，或
- (b) 能以-120 摄氏度或更低温度工作的低温致冷设备，或
- (c) 用于将六氟化铀与载体气分离开来的分离喷嘴或涡流管设备，或
- (d) 能以-20 摄氏度或更低温度工作的六氟化铀冷阱。

5.6. 专门设计或制造用于化学交换或离子交换浓缩工厂的系统、设备和部件

按语

铀的几种同位素在质量上的微小差异，能引起化学反应平衡的小的变化。这可以用来作同位素分离的基础。已经开发成功两种工艺过程：液-液化学交换过程和固-液离子交换过程。

在液-液化学交换过程中，两种不混溶的液相（水相和有机相）作逆流接触，结果给出数千分离级的级联效果。水相由含氯化铀的盐酸溶液组成；有机相由载氯化铀的萃取剂的有机溶剂组成。分离级联中使用的接触器可以是液-液交换柱（例如带有筛板的脉冲柱），或是液体离心接触器。在分离级联的两端要求实现化学转化（氧化和还原）以保证各端的回流要求。一个重要的设计问题是避免这些过程物流被某些金属离子沾污。所以，一般使用塑料的、衬塑料的（包括用氟碳聚合物）和（或）衬玻璃的柱和管线。

在固-液离子交换过程中，浓缩是由铀在一种特制的作用很快的离子交换树脂或吸附剂上的吸附/解吸完成的。使铀的盐酸溶液和其他化学试剂，从载有吸附剂填充床的圆筒形浓缩柱中通过。就一个连续过程而言，需要有一个回流系统，以便把从吸附剂上解吸下来的铀返回到液流中，这样便可收集“产品”和“尾料”。这是通过使用适宜的还原/氧化化学试剂来完成的。这些试剂可在单独的外部的系统中完全再生，并可在同位素分离柱内部分地再生。由于在这种工艺过程中有热的浓盐酸溶液存在，使用的设备应该用专门的耐腐材料制作或保护。

5.6.1. 液-液交换柱（化学交换）

为使用化学交换过程的铀浓缩工厂专门设计或制造的，有机械动力输入的逆流液-液交换柱（即带有筛板的脉冲柱、往复板柱和带有内部涡轮混合器的柱）。为了耐浓盐酸溶液的腐蚀，这些交换柱及其内部构件一般用适宜的塑料（例如氟碳聚合物）或玻璃制作或保护。交换柱的级停留时间一般被设计得很短（30秒或更短）。

5.6.2. 液-液离心接触器（化学交换）

为使用化学交换过程的铀浓缩工厂而专门设计或制造的液-液离心接触器。此类接触器利用转动来达到有机相与水相的分散，然后借助离心力来分离这两相。为了能耐浓盐酸溶液的腐蚀，这些接触器一般用适当的塑料（例如碳氟聚合物）来制作或衬里，或衬以玻璃。离心接触器的级停留时间被设计得很短（30秒或更短）。

5.6.3. 还原系统和设备（化学交换）

- (a) 为使用化学交换过程的铀浓缩工厂专门设计或制造的，用来将铀从一种价态还原为另一种价态的电化学还原槽。与过程溶液接触的这种槽的材料必须能耐浓盐酸溶液腐蚀。

注释

这种槽的阴极室必须设计成能防止铀被再氧化到较高的价态。为了把铀保持在阴极室中，这种槽可有一个由特种阳离子交换材料制成的抗渗的隔膜。阴极一般由石墨之类适宜的固态导体组成。

- (b) 装在级联的产品端为将有机相流中的四价铀移出、调节酸浓度和向电化学还原槽供料而专门设计或制造的系统。

注释

这些系统由以下设备组成：将有机相流中的四价铀反萃取到水溶液中的溶剂萃取设备，完成溶液 pH 值调节和控制的蒸发设备和（或）其他设备，以及向电化学还原槽供料的泵或其他输送装置。一个重要设计问题是要避免水相流被某些种类的金属离子沾污。因此，对该系统那些接触这种过程物流的部分，要用适当的材料（例如玻璃、碳氟聚合物、聚苯硫酸酯、聚醚砜和用树脂浸过的石墨）制成或保护的来构成。

5.6.4. 供料准备系统（化学交换）

专门设计或制造的，用来为化学交换铀同位素分离工厂生产高纯氯化铀供料溶液的系统。

注释

这些系统由进行纯化所需的溶解设备、溶剂萃取设备和（或）离子交换设备，以及用来将六价铀或四价铀还原为三价铀的电解槽组成。这些系统产生只含几个 ppm 铬、铁、钒、钼和其他两价或价态更高的阳离子金属杂质的氯化铀溶液。处理高纯三价铀的系统的若干部分的建造材料包括玻璃、碳氟聚合物、聚苯硫酸酯或聚醚砜塑料衬里的石墨和用树脂浸过的石墨。

5.6.5. 铀氧化系统（化学交换）

专门设计或制造用于将三价铀氧化为四价铀以便返回化学交换浓缩过程的铀同位素分离级联的系统。

注释

这些系统可含有诸如下述设备：

- (a) 使氯气和氧气与来自同位素分离设备的水相流相接触的设备以及将所得四价铀萃入由级联的产品端返回的已被反萃取过的有机相的设备，
- (b) 使水与盐酸分离开来，以便可使水和加浓了的盐酸在适当位置被重新引入工艺过程的设备。

5.6.6. 快速反应离子交换树脂/吸附剂（离子交换）

为以离子交换过程进行铀浓缩而专门设计或制备的快速反应离子交换树脂或吸附剂包括：多孔大网络树脂，和（或）薄膜结构（在这些结构中，活性化学交换基团仅限于非活性多孔支持结构表面的一个涂层），以及处于包括颗粒或纤维在内的任何适宜形式的其他复合结构。这些离子交换树脂/吸附剂有 0.2 毫米或更小的直径，而且在化学性质上必须能耐浓盐酸溶液腐蚀，在物理性质上必须有足够的强度因而在交换柱中不被降解。这些树脂/吸附剂是专门为实现很快的铀同位素交换动力学过程（低于 10 秒的交换速率减半期）而设计的，并且能在 100—200 摄氏度的温度范围内操作。

5.6.7. 离子交换柱（离子交换）

为以离子交换过程进行铀浓缩而专门设计或制造的用于容纳和支撑离子交换树脂/吸附剂填充床层的直径大于 1000 毫米的圆筒状柱。这些柱一般用耐浓盐酸溶液腐蚀的材料（例如钛或碳氟塑料）制成或保护，并能在 100—200 摄氏度的温度范围内和高于 0.7 兆帕（102 磅/平方英寸）的压力下操作。

5.6.8. 离子交换回流系统（离子交换）

- (a) 专门设计或制造的用于使离子交换铀浓缩级联中所用化学还原剂再生的化学或电化学还原系统。
- (b) 专门设计或制造的用于使离子交换铀浓缩级联中所用化学氧化剂再生的化学或电化学氧化系统。

注释

离子交换浓缩过程可使用例如三价钛作为还原阳离子，在这种情况下，所用还原系统将通过还原四价钛使三价钛再生。

离子交换浓缩过程可使用例如三价铁作为氧化剂，在这种情况下，所用氧化系统将通过氧化二价铁来使三价铁再生。

5.7. 专门设计或制造用于以激光为基础的浓缩工厂的系统、设备和部件

按语

目前利用激光的浓缩过程的系统有两类：一类是过程介质为原子铀蒸气的系统，另一类是过程介质为铀化合物的蒸气的系统。这样一些过程的通常名称包括：第一类——原子蒸气激光同位素分离；第二类——分子激光同位素分离和同位素选择性激光活化化学反应。用于激光浓缩工厂的系统、设备和部件包括：(a) 铀金属蒸气供料装置（用于选择性光电离）或铀的化合物蒸气供料装置（用于光离解或化学活化）；(b) 第一类中作为“产品”和“尾料”的浓缩的铀金属和贫化的铀金属收集装置，和第二类中作为“产品”的离解的或反应的化合物和作为“尾料”的未发生变化材料的收集装置；(c) 用于选择性地激发铀-235 的激光过程系统；和 (d) 供料准备设备和产品转化设备。鉴于铀原子和铀化合物能谱的复杂性，可能需要同现有激光技术中的任何一种联合使用。

注释

本段所列的许多物项将直接接触铀金属蒸气、液态金属铀，或由六氟化铀或六氟化铀和其他气体的混合物组成的过程气体。所有与铀或六氟化铀接触的表面，都全部地由耐腐蚀材料制造或保护。就有关基于激光的浓缩的物项而言，耐铀金属或铀合金蒸气或液体的腐蚀的材料包括：氧化钽涂敷石墨和钽；耐六氟化铀腐蚀的材料包括：铜、不锈钢、铝、铝合金、镍或镍含量不低于 60% 的合金和耐六氟化铀腐蚀的完全氟化的烃聚合物。

5.7.1. 铀蒸发系统（原子蒸气激光同位素分离）

专门设计或制造的铀蒸发系统。这些系统含有大功率条带式或扫描式电子束枪，其供到靶上的功率大于 2.5 千瓦/厘米。

5.7.2. 液态铀金属处理系统（原子蒸气激光同位素分离）

专门设计或制造由一些坩埚及其冷却设备组成用于处理熔融铀或铀合金的液态金属处理系统。

注释

这种系统的坩埚和其他接触熔融铀或铀合金的部分，要用有适当的耐腐蚀和耐高温性能的材料制成或保护。适当的材料包括钽、氧化钽涂敷石墨、用其他稀土氧化物（见 INFCIRC/254/Part 2（修订本））或其混合物涂敷的石墨。

5.7.3. 铀金属“产品”和“尾料”收集器组件（原子蒸气激光同位素分离）

专门设计或制造用于收集液态或固态铀金属的“产品”和“尾料”收集器组件。

注释

这些组件的部件由耐铀金属蒸气或液体的高温和腐蚀性的材料（例如氧化钇涂敷石墨或钽）制成或保护。这类部件可包括用于磁的、静电的或其他分离方法的管、阀、管接头、“出料槽”、进料管、热交换器和收集板。

5.7.4. 分离器组件外壳（原子蒸气激光同位素分离）

专门设计或制造的圆筒状或矩形容器，用于容纳铀金属蒸气源、电子束枪，及“产品”与“尾料”收集器。

注释

这些外壳有多种样式的开口，用于电源电缆、供水管、激光束窗、真空泵接头和仪器诊断和监测。这些开口均设有开闭装置，以便整修内部的部件。

5.7.5. 超声膨胀喷嘴（分子激光同位素分离）

专门设计或制造的超声膨胀喷嘴，用于冷却六氟化铀与载体气的混合气至 150 开或更低的温度。这种喷嘴耐六氟化铀腐蚀。

5.7.6. 氟化铀产品收集器（分子激光同位素分离）

专门设计或制造的五氟化铀固态产品收集器。这种收集器是过滤式、冲击式或旋流式收集器，或其组合；并且耐五氟化铀/六氟化铀环境的腐蚀。

5.7.7. 六氟化铀/载体气压缩机（分子激光同位素分离）

为在六氟化铀环境中长期操作而专门设计或制造的六氟化铀/载体气混合气压缩机。这些压缩机中与过程气体接触的部件用耐六氟化铀腐蚀的材料制成或保护。

5.7.8. 转动轴封（分子激光同位素分离）

专门设计或制造的有密封的进气口和出气口的转动轴封，用于密封把压缩机转子与驱动马达连接起来的轴，以保证可靠的密封，防止过程气体外漏，或空气或密封气体漏入充满六氟化铀/载体气混合气的压缩机内腔。

5.7.9. 氟化系统（分子激光同位素分离）

专门设计或制造的用于将五氟化铀（固体）氟化为六氟化铀（气体）的系统。

注释

这些系统是为将所收集的五氟化铀粉末氟化为六氟化铀而设计的。其六氟化铀随后将被收集于产品容器中，或作为进料被转送到为进行进一步浓缩而设置的分子激光同位素分离单元中。在一种方案中，这种氟化反应可在同位素分离系统内部完成，以便一离开“产品”收集器便反应和回收。在另一种方案中，五氟化铀粉末将被从“产品”收集器中移出/转送到一个适当的反应容器（例如流化床反应器、螺旋反应器或火焰塔式反应器）中进行氟化。在这两种方案中，都使用氟气（或其他适宜的氟化剂）贮存和转送设备，以及六氟化铀收集和转送设备。

5.7.10. 六氟化铀质谱仪/离子源（分子激光同位素分离）

专门设计或制造的磁质谱仪或四极质谱仪，这些质谱仪能从六氟化铀气流中“在线”取得供料、“产品”或“尾料”的样品，并且有以下所有特点：

1. 质量的单位分辨率高于 320；
2. 离子源用尼赫罗姆合金或蒙乃尔合金制成或以这些材料作为衬里或镀镍；
3. 电子轰击离子源；
4. 适合于同位素分析的收集器系统。

5.7.11. 进料系统/产品和尾料提取系统（分子激光同位素分离）

为浓缩厂专门设计或制造的工艺系统或设备，由耐六氟化铀腐蚀的材料制造或用这种材料保护，包括：

- (a) 进料高压釜、加热炉或系统，用于使六氟化铀进入浓缩过程；
- (b) 凝华器（或冷阱），用于使六氟化铀离开浓缩过程以便随后在受热时转移；
- (c) 固化或液化器，用来通过压缩六氟化铀和把它转变成液态或固态，使六氟化铀离开浓缩过程；
- (d) “产品”或“尾料”器，用于把六氟化铀收集到容器内。

5.7.12. 六氟化铀/载体气分离系统（分子激光同位素分离）

为将六氟化铀从载体气中分离出来专门设计或制造的工艺系统。载体气可为氮、氩或其他气体。

注释

这类系统可装有设备例如：

- (a) 低温热交换器或低温分离器，能承受-120 摄氏度或更低的温度；
- (b) 低温冷冻器，能承受-120 摄氏度或更低的温度；
- (c) 六氟化铀冷阱，能承受-20 摄氏度或更低的温度。

5.7.13. 激光系统（原子蒸气激光同位素分离，分子激光同位素分离和同位素选择性激光活化化学反应）

为铀同位素分离专门设计或制造的激光器或激光系统。

注释

在以激光为基础的浓缩过程中有重要意义的激光器和激光部件包括 INFCIRC/254/Part 2（修订本）中所指出的那些激光器及激光部件。原子蒸气激光同位素分离过程使用的激光系统通常由两个激光器组成：一个铜蒸气激光器和一个染料激光器。分子激光同位素分离使用的激光系统通常由一个二氧化碳激光器或激发激光器和一个多道光学栅（两端有旋转镜）组成。这两种过程使用的激光器或激光系统都需要有一个谱频稳定器以便能够长时间地工作。

5.8. 专门设计或制造的用于等离子体分离浓缩厂的系统、设备和部件

按语

在等离子体分离过程中，铀离子等离子体通过一个调到铀-235 离子共振频率的电场，这样铀离子优先吸收能量并增大它们螺旋状轨道的直径。具有大直径径迹的离子被捕集从而产生铀-235 被浓集的产品。由电离的铀蒸气组成的等离子体被约束在具有由超导磁体产生的高强度磁场的真空室内。这个过程的主要技术系统包括铀等离子体发生系统，带有超导磁体（见 INFCIRC/254/Part 2（修订本））的分离器组件和用于搜集“产品”和“尾料”的金属移出系统。

5.8.1. 微波动力源和天线

为产生或加速离子专门设计或制造的微波动力源和天线，具有以下特性：频率高于 30 千兆赫，和用于产生离子的平均功率输出大于 50 千瓦。

5.8.2. 离子激发蛇形管

专门设计或制造的射频离子激发蛇形管，用于高于 100 千赫的频率并能够输送的平均功率高于 40 千瓦。

5.8.3. 铀等离子体发生系统

为产生铀等离子体专门设计或制造的系统，这种系统可装有高功率条带式或扫描式电子束枪，靶上的释热高于 2.5 千瓦/厘米。

5.8.4. 液态铀金属操作系统

专门设计制造的用于熔融的铀或铀合金的液态金属操作系统，包括坩埚和坩埚用冷却设备。

注释

这种系统中与熔融的铀或铀合金接触的坩埚和其他部件由适当的抗腐蚀和抗热材料构成或由这种材料作防护层。可适用的材料包括钽、有钽涂层的石墨、有其他稀土氧化物（见 INFCIRC/254/Part 2（修订本））或这类氧化物的混合物涂层的石墨。

5.8.5. 铀金属“产品”和“尾料”收集器组件

专门设计或制造的用于固态铀金属的“产品”和“尾料”收集器组件。这类收集器组件由抗热和抗铀金属蒸汽腐蚀的材料构成或由这类材料作防护层，例如有钽涂层的石墨或钽。

5.8.6. 分离器组件外壳

专门设计或制造的园筒形容器，供等离子体分离浓缩厂用来容纳铀等离子体源、射频驱动蛇形管及“产品”和“尾料”收集器。

注释

这种外壳有多种形式的开口，用于供电装置、扩散泵接头及仪器仪表诊断和监测。这些开口设有开闭装置，以便整修内部部件；它们由适当的非磁性材料例如不锈钢构成。

5.9. 专门设计或制造的用于电离浓缩厂的系统、设备和部件

按语

在电磁过程中，由一种盐原料（典型的是四氯化铀）离子化产生的金属铀离子被加速并通过一个能使不同同位素离子流经不同径迹的磁场。电磁同位素分离器的主要部件包括：同位素离子束分散/分离用的磁场、离子源及其加速系统和收集经分离的离子的系统。这个过程的辅助系统包括磁体供电系统、离子源高压供电系统、真空系统以及产品回收及部件的清洁/再循环用多种化学处理系统。

5.9.1. 电磁同位素分离器

为分离铀同位素专门设计或制造的电磁同位素分离器及其设备和部件包括：

(a) 离子源

专门设计或制造的一种或多种铀离子源由蒸汽源、电离剂和射束加速器组成，用石墨、不锈钢或铜等适当材料建造，能提供总强度为 50 毫安或更高的离子束流。

(b) 离子收集器

收集器板极由专门为收集浓缩和贫化铀离子束而设计或制造的两个或多个槽和容器组成，用石墨或不锈钢一类的适当材料建造。

(c) 真空外壳

为铀电磁分离器专门设计或制造的真空外壳，用不锈钢一类的非磁性适当材料建造，设计在 0.1 帕或以下的压力下运行。

注释

外壳专门设计成装有离子源、收集器板极和水冷却管路，并有用于扩散泵连接结构和可用来移出和重新安装这些部件的开闭结构。

(d) 磁极块

专门设计或制造的磁极块，直径大于 2 米，用来在电磁同位素分离器内维持恒定磁场并在毗连分离器之间传输磁场。

5.9.2. 高压电源

为离子源专门设计或制造的高压电源，具有以下所有特点：能连续工作，输出电压为 20000 伏或更高，输出电流为 1 安或更高，电压稳定性在 8 小时内高于 0.01%。

5.9.3. 磁体电源

专门设计或制造的高功率直流磁体电源，具有以下所有特点：能在 100 伏或更高的电压下连续产生 500 安或更高的电流输出，电流或电压稳定性在 8 小时内高于 0.01%。

6. 生产或浓缩重水、氘和氚化物的工厂以及专门为其设计或制造的设备

按语

重水可以通过多种方法生产。然而只有两种方法已证明具有商业意义：水-硫化氢交换法和氨-氢交换法。

水-硫化氢交换法是基于在一系列塔内（通过顶部冷和底部热的方式操作）水和硫化氢之间氢与氘交换的一种方法。在此过程中，水向塔低流动，而硫化氢气体从塔底向塔顶循环。使用一系列多孔塔板促进硫化氢气体和水之间的混合。在低温下氘向水中迁移，而在高温下氘向硫化氢中迁移。氘被浓缩了的硫化氢气体或水从第一级塔的热段和冷段的接合处排出，并且在下一级塔中重复这一过程。最后一级产品（氘浓缩至高达 30%的水）送入一个蒸馏单元以制备反应堆级的重水（即 99.75%的氧化氘）。

氨-氢交换法可以在催化剂存在下通过同液态氨的接触从合成气中提取氘。合成气被送进交换塔，而后送至氨转换器。在交换塔内气体从塔底向塔顶流动，而液氨从塔顶向塔底流动。氘从合成气的氢中洗涤下来并在液氨中浓集。液氨然后流入塔底部的氨裂化器，而气体流入塔顶部的氨转换器。在以后的各级中得到进一步浓缩，最后通过蒸馏生产出反应堆级重水。合成气进料可由氨厂提供，而这个氨厂也可以结合氨-氢交换法重水厂一起建造。氨-氢交换法也可以用普通水作为氘的供料源。

利用水-硫化氢交换法或氨-氢交换法生产重水的工厂所用的许多关键设备项目是与化学工业和石油工业的若干生产工序所用设备相同的。对于利用水-硫化氢交换法的小厂来说尤其如此。然而，这种设备项目很少有“现货”供应。水-硫化氢交换法和氨-氢交换法要求在高压下处理大量易燃、有腐蚀性和有毒的流体。因此，在制定使用这些方法的工厂和设备所用的设计和运行标准时，要求认真注意材料的选择和材料的规格，以保证在长期服务中有高度的安全性和可靠性。规模的选择主要取决于经济性和需要。因而，大多数设备项目将按照用户顾主的要求制造。

最后，应该指出，对水-硫化氢交换法和氨-氢交换法而言，那些单独地看并非专门设计或制造用于重水生产的设备项目可以组装成专门设计或制造用于生产重水的系统。氨-氢交换法所用的催化剂生产系统和在上述两方法中将重水最终加浓至反应堆级所用的水蒸馏系统就是此类系统的实例。

专门设计或制造用于利用水-硫化氢交换法或氨-氢交换法生产重水的设备项目包括如下：

6.1. 水-硫化氢交换塔

专门设计或制造用于利用水-硫化氢交换法生产重水的用精制碳钢（例如 ASTM A516）制造的交换塔。该塔直径 6 米（20 英尺）至 9 米（30 英尺），能够在大于或等于 2 兆帕（300 磅/平方英寸）压力下和 6 毫米或更大的腐蚀允量下运行。

6.2. 鼓风机和压缩机

专门为利用水-硫化氢交换法生产重水而设计或制造的用于循环硫化氢气体（即含硫化氢 70%以上的气体）的单级、低压头（即 0.2 兆帕或 30 磅/平方英寸）离心式鼓风机或压缩机。这些鼓风机或压缩机的气体通过能力大于或等于 56 立方米/秒（120 000 标准立方英尺/分），能在大于或等于 1.8 兆帕（260 磅/平方英寸）的吸入压力下运行，并有对湿硫化氢介质的密封设计。

6.3. 氨-氢交换塔

专门设计或制造用于利用氨-氢交换法生产重水的氨-氢交换塔。该塔高度大于或等于 35 米（114.3 英尺），直径 1.5 米（4.9 英尺）至 2.5 米（8.2 英尺），能够在大于 15 兆帕（2225 磅/平方英寸）压力下运行。这些塔至少都有一个用法兰联结的轴向孔，其直径与交换塔筒体部分直径相等，通过此孔可装入或拆除塔内构件。

6.4. 塔内构件和多级泵

专门为利用氨-氢交换法生产重水而设计或制造的塔内构件和多级泵。塔内构件包括专门设计的促进气/液充分接触的多级接触装置。多级泵包括专门设计的用来将一个接触级内的液氨向其他级塔循环的水下泵。

6.5. 氨裂化器

专门设计或制造的用于利用氨-氢交换法生产重水的氨裂化器。该装置能在大于或等于 3 兆帕（450 磅/平方英寸）的压力下运行。

6.6. 红外吸收分析器

能在氘浓度等于或高于 90%的情况下“在线”分析氢/氘比的红外吸收分析器。

6.7. 催化燃烧器

专门设计或制造的用于利用氨-氢交换法生产重水时将浓缩氘气转化成重水的催化燃烧器。

6.8. 整个重水提浓系统或其蒸馏柱

为将重水提浓到反应堆级氘浓度专门设计或制造的整个重水提浓系统或其蒸馏柱。

注释

这类系统是为用浓度较低的重水原料生产反应堆级重水（即典型地含 99.75%的氧化氘）而专门设计和制造的。这些系统通常采用水蒸馏的办法从轻水中分离重水。

7. 分别按照第 4 段和第 5 段的规定可用于制造燃料元件和铀同位素分离的铀和钚的转化厂以及专门为其设计或制造的设备

出口

在此范围内的整套大型物项的出口只能根据《准则》的程序来进行。在此范围内的所有工厂、系统和专门设计或制造的设备均可用于加工、生产或使用特种可裂变材料。

7.1. 铀转化厂以及专门为其设计或制造的设备

按语

铀转化厂和系统可以对铀进行一种或几种转化使其从一种化学状态转变为另一种化学状态，包括：从铀浓缩物到三氧化铀的转化；从三氧化铀到二氧化铀的转化；从铀的氧化物到四氟化铀或六氟化铀的转化；从四氟化铀到六氟化铀的转化；从六氟化铀到四氟化铀的转化；四氟化铀到金属铀的转化，和从铀的氟化物到二氧化铀的转化。铀转化工厂所用许多关键设备物项与化学加工工业的若干生产工序所用设备相同。例如，这些过程中使用的各类设备可以包括：加热炉、回转炉、流化床反应器、火焰塔式反应器、液体离心机、蒸馏塔和液-液萃取塔。不过，这些物项中很少有“现货”供应，大部分将须按用户要求和规格制造。在某些情况下，为了适应所处理的一些化学品（氟化氢、氟、三氟化氯和各种铀的氟化物）的腐蚀性质，需要作专门的设计和建造考虑。最后应该指出，在所有铀转化过程中，那些单独地看不是为铀转化专门设计或制造的设备物项，可被组装成专门为铀转化而设计或制造的系统。

7.1.1. 为将铀浓缩物转化为三氧化铀而专门设计或制造的系统

注释

从铀浓缩物到三氧化铀的转化可通过以下步骤实现：首先，用硝酸溶解铀浓缩物，用磷酸三丁酯之类溶剂萃取纯化的硝酸铀酰；然后，硝酸铀酰通过浓缩和脱硝转化为三氧化铀，或用气态氨中和产生重铀酸铵，接着通过过滤、干燥和煅烧转化为三氧化铀。

7.1.2. 为将三氧化铀转化为六氟化铀而专门设计或制造的系统

注释

从三氧化铀到六氟化铀的转化可以直接通过氟化实现。该过程需要一个氟气源或三氟化氯源。

7.1.3. 为将三氧化铀转化为二氧化铀而专门设计或制造的系统

注释

从三氧化铀到二氧化铀的转化，可以用裂解的氨气或氢气还原三氧化铀来实现。

7.1.4. 为将二氧化铀转化为四氟化铀而专门设计或制造的系统

注释

从二氧化铀到四氟化铀的转化，可以用氟化氢气体在 300—500 摄氏度与二氧化铀反应来实现。

7.1.5. 为将四氟化铀转化为六氟化铀而专门设计或制造的系统

注释

从四氟化铀到六氟化铀的转化，可以用氟气在塔式反应器中与四氟化铀发生放热反应来实现。使流出气体通过一个冷却到-10 摄氏度的冷阱把热的流出气体中的六氟化铀冷凝下来。该过程需要一个氟气源。

7.1.6. 为将四氟化铀转化为金属铀而专门设计或制造的系统

注释

从四氟化铀到金属铀的转化，可用镁（大批量）或钙（小批量）还原四氟化铀来实现。还原反应一般在高于铀熔点（1130 摄氏度）的温度下进行。

7.1.7. 为将六氟化铀转化为二氧化铀而专门设计或制造的系统

注释

从六氟化铀到二氧化铀的转化，可用三种方法来实现。在第一种方法中，用氢气和水蒸气将六氟化铀还原并水解为二氧化铀。在第二种方法中，通过溶解在水中而将六氟化铀水解，然后加入氨沉淀出重铀酸铵，接着可在 820 摄氏度用氢气将重铀酸铵还原为二氧化铀。在第三种方法中，将气态六氟化铀、二氧化碳和氨通入水中，结果沉淀出碳酸铀酰铵。在 500—600 摄氏度，碳酸铀酰铵与水蒸气和氢气发生反应，生成二氧化铀。

从六氟化铀到二氧化铀的转化，通常是燃料制造厂的第一个工序。

7.1.8. 为将六氟化铀转化为四氟化铀而专门设计或制造的系统

注释

从六氟化铀到四氟化铀的转化，是用氢还原实现的。

7.1.9. 为将二氧化铀转化为四氯化铀而专门设计或制造的系统

注释

可用以下两种方案中的任意一种使二氧化铀转化为四氯化铀。第一种方法是，使二氧化铀与四氯化碳在大约 400 摄氏度下进行反应。第二种方法是，使二氧化铀在约 700 摄氏度下并在碳黑（化学提取服务 1333-86-4）、一氧化碳和氯存在下反应以产生四氯化铀。

7.2. 铀转化厂以及专门为其设计或制造的设备

按语

铀转化厂和系统可以对铀进行一种或几种转化使其从一种化学状态转变为另一种化学状态，包括：从硝酸铀到二氧化铀的转化；从二氧化铀到四氟化铀的转化和四氟化铀到金属铀的转化。铀转化工厂通常与后处理设施有关，但也可能与铀燃料制造设施有关。铀转化厂所用许多关键设备物项与化学加工工业的若干生产工序所用设备相同。例如，这些过程中使用的各类设备可以包括：加热炉、回转炉、流化床反应器、火焰塔式反应器、液体离心机、蒸馏塔和液-液萃取塔。也有可能需要热室、手套箱和远距离操纵器。不过，这些物项中很少有“现货”供应，大部分将须按用户要求和规格制造。在设计时要特别注意与铀有关的特种放射性、毒性和临界危险。在某些情况下，为了适应所处理的一些化学品（如氟化氢）的腐蚀性质，需要作专门的设计和建造考虑。最后应该指出，在所有铀转化过程中，那些单独地看不是为铀转化专门设计或制造的设备物项，可被组装成专门为铀转化而设计或制造的系统。

7.2.1. 为使硝酸铀转化到氧化铀而专门设计或制造的系统

注释

这个流程所涉及的主要功能是：流程进料贮存和调节、沉淀和固/液分离、煅烧、产品装运、通风、废物管理和流程控制。这些流程系统需要特别配置以避免临界和辐射影响并且将毒性危害减到最小。在大多数后处理设施中，这个流程包括将硝酸铀转变成二氧化铀。其他流程可以包括草酸铀或过氧化铀的沉淀。

7.2.2. 为生产金属铀而专门设计或制造的系统

注释

这个流程通常涉及：通常用强腐蚀性氟化氢使二氧化铀氟化，产生氟化铀；然后用高纯度钙金属使氟化铀还原，产生金属铀和氟化钙渣。这个流程所涉及的主要功能是：氟化（例如涉及用贵金属制造或作衬垫的设备）、金属还原（例如用陶瓷坩锅）、渣的回收、产品装运、通风、废物管理和流程控制。这些流程系统需要特别配置以避免临界和辐射影响并且将毒性危害减到最小。其他流程包括草酸铀或过氧化铀的氟化接着还原成金属。

附件 C

实物保护级别的标准

1. 核材料实物保护的目的是防止擅自使用和处理这些材料。准则文件第 3(a) 段要求在考虑国际建议的情况下，供应国之间商定应当保证的，与材料及载有这些材料的设备和设施类型有关的实物保护级别。
2. 准则文件第 3(b) 段说明，在接受国实施实物保护措施是该国政府的责任。但是，这些措施必须依据的实物保护级别，应当列入供应国和收受国之间的协议。在这方面，这些要求应当适用于所有的国家。
3. 题为“核材料实物保护”的国际原子能机构 INFCIRC/225 号文件和由国际专家组随时编写并在适当考虑核材料实物保护最新知识现状情况下不断修订的其他类似文件，是指导接受国设计一个有实物保护措施和程序的系统的有益基准。
4. 附表列出的核材料类别或其经各供应方共同同意随时作的修订，应作为依照准则文件第 3(a) 和 3(b) 段设计与材料及载有这些材料的设备和设施的类别有关的具体实物保护级别的一致同意的基础。
5. 国家主管部门在使用、贮存和运输附表所列材料时应保证的一致同意的实物保护级别，最低限度应包括下列保护特点：

三类材料

应在一个出入受到监督的区域中**使用和贮存**。

运输时要特别小心，发送方、收受方和承运方之间要作出事先安排，而且在国际运输的情况下，分别受供应国和收受国管辖和管理的单位之间要事先达成协议，具体规定转移运输责任的时间、地点和程序。

二类材料

应在一个出入受到监督的区域**使用和贮存**。该区域应是昼夜有警卫和电子设备监视，周围设有实物屏障，屏障的出入口数目有一定限制，并受适当监督的区域；或具有相同实物保护级别的任何区域；

运输时要特别小心，发送方、收受方和承运方之间要作出事先安排，而且在国际运输的情况下，分别受供应国和收受国管辖和管理的单位之间要事先达成协议，具体规定转移运输责任的时间、地点和程序。

一类材料

这类材料应按下述方式以高度可靠的系统保护，以防擅自使用：

在受到高度保护的区域中**使用和贮存**。该区域除按上述二类材料所规定的设有保护外，还应当只准已被确定可靠的人出入，出入应在警卫的监视之下，警卫与适当的后援部队保持密切联系。同时应采取具体措施，侦察和防止任何袭击、擅自出入或擅自取走材料的行为。

运输时除了要象以上指出的运输二、三类材料那样特别小心外，护送人员要昼夜看守，并保证同适当的后援部队保持密切联系。

6. 供应方应要求接受方指明：负责保证充分满足实物保护级别要求和负责在发生擅自使用或挪动被保护材料情况下的内部协调响应/查找工作的那些组织或主管部门。供应方和接受方还应指定它们国家主管部门内的联络点，以便就国外运输和共同关心的其他事项进行合作。

核 材 料 分 类 表

材 料	形 式	类 别		
		一类	二类	三类
1. 钚*[a]	未辐照的*[b]	2 千克或 2 千克以上	2 千克以下 500 克以上	500 克或 500 克以下*[c]
2. 铀-235	未辐照的*[b]			
	— 铀-235 浓缩度为 20%或 20% 以上的铀	5 千克或 5 千克以上	5 千克以下 1 千克以上	1 千克或 1 千克以下*[c]
	— 铀-235 浓缩度为 10%至 20% (不含 20%)的铀	—	10 千克或 10 千克以上	10 千克以下*[c]
	— 铀-235 浓缩度高于天然铀但 低于 10%的铀*[d]	—	—	10 千克或 10 千克以上
3. 铀-233	未辐照的*[b]	2 千克或 2 千克以上	2 千克以下 500 克以上	500 克或 500 克以下*[c]
4. 辐照过的燃料			贫化铀或天然铀，钍或低浓 燃料（易裂变材料含量低于 10%）*[e][f]	

[a] 按触发清单中的规定。

[b] 未在反应堆中辐照过的材料，或虽在反应堆中辐照过，但在无屏蔽 1 米距离处的辐射水平等于或小于 100 拉德/小时的材料。

[c] 低于 1 个辐射重要量的材料应予豁免。

[d] 天然铀、贫化铀和钍以及浓缩度低于 10%且数量不足以列入三类的铀应按照慎重的管理实践予以保护。

[e] 虽然建议了本类保护级别，但各国可根据对具体情况的评价自行规定不同的实物保护级别。

[f] 在辐照前根据其原始易裂变材料含量被列为一类或二类的其他燃料，虽在无屏蔽 1 米距离处的辐射水平超过 100 拉德/小时，但仍可降低一级。

“核转让准则”（INFCIRC/254/Rev.7/Part 1）修改对照表

A. 旧文件	B. 新文件
保 障 4. (a) 供应方只应在下述情况下才向无核武器国家转让触发清单物项或相关技术，即接受国同原子能机构缔结的要求对其目前和未来和平活动中的一切源材料和特种可裂变材料实施保障的协定已生效。	保 障 4. (a) 供应方只应在下述情况下才向无核武器国家转让触发清单物项或相关技术，即接受国同原子能机构缔结的要求对其目前和未来和平活动中的一切源材料和特种可裂变材料实施保障的协定已生效。<u>供应方只应在接受方作出下述正式的政府保证时才批准这类转让：</u> — <u>如果上述协定应予终止，接受方将使根据原子能机构现行保障协定范本与原子能机构缔结的要求对供应方转让的、或与这类转让有关而加工、生产或使用的所有触发清单物项或相关技术实施保障的协定付诸生效；</u> — <u>如果原子能机构决定原子能机构的保障已不再可能适用，供应方和接受方应制订适当的核查措施。如果接受方不接受这些措施，则应在供应方要求时允许归还所转让的和所衍生的触发清单物项。</u>
	<u>对再转让的控制</u> 9(d) <u>如果由于接受方没有按照联合国安理会第 1540 号决议的规定建立和保持适当、有效的国家出口和转运控制而存在与第 9(a) 段和第 9(c) 段中作出的保证相反的再转让风险，供应方在转让触发清单中确定的物项和相关技术时应考虑限制措施。</u>
	<u>出口控制</u> 15. <u>供应方应酌情向接受方强调对所转让的触发清单物项和相关技术以及从供应方原先转让的设施衍生的或借助供应方原先转让的设备或技术得到的触发清单物项实施联合国安理会第 1540 号决议所规定的出口控制的必要性。鼓励供应方向接受方提供援助，以酌情和切实可行地根据联合国安理会第 1540 号决议履行各自的义务。</u>

“核转让准则”（INFCIRC/254/Rev.7/Part 1）修改对照表

磋 商	磋 商
15. (a) 供应方应通过正常渠道就有关执行本准则的事项保持接触和进行磋商。 (b) 供应方…… (c) 如果一个或几个供应方认为，特别就爆炸核装置而言，已存在违反由本准则产生的供应方/接受方谅解的情况，或接受方非法终止或违反原子能机构保障，供应方应立即通过外交渠道磋商，以便确定和评估所称违反的实情和程度。 在这种磋商得出初步结果之前，供应方将不以可能不利于其他供应方或许会采取的有关它们当前同接受方接触的任何措施的方式行动。 一俟这类磋商得出结论，供应方应铭记《原子能机构规约》第十二条，商定可能包括终止对接受方核转让在内的适当对策和可能的行动。	16. (a) 供应方应通过正常渠道就有关执行本准则的事项保持接触和进行磋商。 (b) 供应方…… (c) 在不影响以下(d)分段至(f)分段的情况下： — 如果一个或几个供应方认为，特别就爆炸核装置而言，已存在违反由本准则产生的供应方/接受方谅解的情况，或接受方非法终止或违反原子能机构保障，供应方应立即通过外交渠道磋商，以便确定和评估所称违反的实情和程度。<u>还鼓励供应方在发现未向原子能机构申报的核材料或核燃料循环活动或某种核爆炸活动的情况下进行磋商。</u> — 在这种磋商得出初步结果之前，供应方将不以可能不利于其他供应方或许会采取的有关它们当前同接受方接触的任何措施的方式行动。<u>在第 16(c) 段所述磋商进行期间，并在供应方商定适当的对策之前，每个供应方还应当考虑中止触发清单物项的转让。</u> — 一俟这类磋商得出结论，供应方应铭记《原子能机构规约》第十二条，商定可能包括终止对接受方核转让在内的适当对策和可能的行动。 (d) 如果据原子能机构报告，接受方违反了其遵守保障协定的义务，则在原子能机构就此调查期间，供应方应考虑中止向当事国转让触发清单物项。就本段而言，“违反”仅指具有扩散关切的严重违反行为。 (e) 供应方支持中止向违反其防止核扩散和保障义务的国家转让触发清单物项，并承认作出这类决定的责任和权利在国家政府或联合国安理会。这特别适用于原子能机构理事会采取下述任何行动的情况：

“核转让准则”（INFCIRC/254/Rev.7/Part 1）修改对照表

	— <u>按照《规约》第十二条 C 款，查悉接受方存在不遵守行为，或要求接受方采取特定行动以使其遵守保障义务；</u> — <u>决定原子能机构不能核实要求接受保障的核材料没有被转用，包括因接受方所采取的行动而使原子能机构不能在当事国执行其保障任务的情况。</u> <u>特别全体会议将在理事会采取行动的一个月内举行，供应方将在会议上审议有关情况，比较国家政策，并就适当对策作出决定。</u> <u>(f) 以上(e)分段的规定不适用于根据本准则第 4(b) 段进行的转让。</u>
16. 对本准则的任何修改包括由于第 5 段所述重新考虑而可能进行的任何修改，均需得到一致同意。	<u>17.</u> 对本准则的任何修改包括由于第5段所述重新考虑而可能进行的任何修改，均需得到一致同意。

情况通报

INFCIRC/254/Rev.7/Part 2^a

Date: 29 March 2006

General Distribution

Chinese

Original: English

一些成员国关于与核有关的 两用设备、材料、软件和相关技术 转让准则的信函

1. 国际原子能机构总干事已收到阿根廷、澳大利亚、奥地利、白俄罗斯、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、日本、大韩民国、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、新西兰、波兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国常驻原子能机构的代表2005年12月1日关于与核有关的两用设备、材料、软件和相关技术转让的普通照会。
2. 这些普通照会的目的是提供这些政府关于《与核有关的两用设备、材料、软件和相关技术的转让准则》的进一步情况。
3. 根据每份普通照会末尾所表达的愿望，现将这些普通照会的正文附后，并全文复载这些普通照会的附文。

^a 经修订的 INFCIRC/254/Part 1 号文件载有《核材料、核设备和核技术出口准则》。

普通照会

[国名]常驻代表团向国际原子能机构（原子能机构）总干事致意，并荣幸地提及[以前的相关信函]，在该（这些）信函中，[国名]政府决定按照现作为INFCIRC/254/Rev.6/Part 2号文件（包括附件）公布的《与核有关的两用设备、材料和相关技术的转让准则》行事。

[国名]政府已决定修订该准则，以反映作为实施该准则所述转让的相关因素进行有效出口控制的必要性。因此，增列了第4(i)段。

[国名]政府还决定对附件中有关工具机的各项（1.B.2.b 和 1.B.2.c）进行修改，以反映当前技术的变化和对新技术实施控制。因此，对 1.B.2.b 和 1.B.2.c 都增加了一个新的第3段，以反映新的技术特征；对附件第 1.B.2 项的技术说明 2 作了修改，并新增了技术说明 4、5 和 6，以阐明控制范围。

[国名]政府还阐明了对激光的控制范围。对 1.B.3.c 项作了修改，以反映控制范围不包括基于激光的自动准直仪。这一修改的依据是最近对《瓦瑟纳尔协议》所作的修改。

为清晰起见，附文中全文复载经修订的准则及其附件，以及“《与核有关的两用设备、材料和相关技术的转让准则》（INFCIRC/254/Rev.6/Part 2）修改对照表”。

[国名]政府已决定按照经如此修订的准则行事。

在作出这项决定时，[国名]政府充分认识到在促进经济发展的同时，避免以任何方式助长核武器或其他核爆炸装置扩散或被转用于核恐怖主义行为的必要性，并且有必要将不扩散或不转用的保证问题与商业竞争问题区分开来。

[就欧洲联盟内的贸易而言，（国名）政府将根据作为欧盟成员国所作的承诺执行此决定。]¹

如蒙原子能机构总干事提请全体成员国注意本照会及其附文，[国名]政府将不胜感激。

[国名]常驻代表团借此机会再次向国际原子能机构总干事表示最崇高的敬意。

¹ 仅在欧盟成员国的普通照会中包含此段。

与核有关的两用设备、材料、软件和相关技术的转让准则

目 标

1. 为防止核武器扩散和防止核恐怖主义行为，供应方已在考虑关于某些可能对“核爆炸活动”、“未受保障的核燃料循环活动”或核恐怖主义行为起重要作用的设备、材料、软件和相关技术的转让程序。在这方面，供应方商定了下述原则、通用定义和一份关于设备、材料、软件和相关技术的出口控制清单。本准则无意阻碍国际合作，但条件是这种合作不会助长核爆炸活动、未受保障的核燃料循环活动或核恐怖主义行为。供应方拟依照国家法律和相关国际承诺来实施本准则。

基本原则

2. 供应方不得批准附件中所确定的设备、材料、软件或相关技术在下述情况下的转让：
 - 用于无核武器国家的核爆炸活动或未受保障的核燃料循环活动，或
 - 一般说来，在存在转用于此类活动的不可接受的危险时，或在这种转让违反防止核武器扩散的目标时，或
 - 在存在转用于核恐怖主义行为的不可接受的危险时。

术语解释

3. (a) “核爆炸活动”包括：任何核爆炸装置或这种装置的部件或子系统的研究或研制、设计、制造、建造、试验或维护。

(b) “未受保障的核燃料循环活动”包括：任何反应堆、临界装置、转换厂、制造厂、后处理厂、源材料或特种可裂变材料的同位素分离厂或独立的贮存设施的研究或研制、设计、制造、建造、运行或维护，而其现有的或未来的有关设施或装置在包容任何源材料或特种可裂变材料时，没有接受国际原子能机构（原子能机构）保障的义务；或任何下类重水生产厂的研究或研制、设计、制造、建造、运行或维护，在这些重水生产厂对于用其生产的任何重水所生产的任何核材料（或其使用与这些重水生产厂生产的任何重水有关）没有接受原子能机构保障的义务；或没有履行这类义务时。

出口许可证审批程序的制订

4. 供应方应落实旨在确保有效实施本准则的法律措施，包括出口许可证审批条例、强制性措施和违约处罚。在考虑是否批准转让时，供应方应谨慎从事，以便执行“基本原则”，并应考虑下述有关因素：
 - (a) 接受方是否是《不扩散核武器条约》或《拉丁美洲禁止核武器条约》（特拉特洛尔科条约）或类似的具有国际法律约束力的核不扩散协定的缔约国，且是否有有效的适用于其一切和平核活动的原子能机构的保障协定；
 - (b) 未参加《不扩散核武器条约》、“特拉特洛尔科条约”或类似的具有国际法律约束力的核不扩散协定的任何接受方，是否拥有上述第 3 段(b)款所列的不接受或将不接受原子能机构保障的正在运行中或正在设计或建造中的任何设施或装置；
 - (c) 拟转让的设备、材料、软件或相关技术是否适于所声明的最终用途，所声明的最终用途是否适合于最终用户；
 - (d) 拟转让的设备、材料、软件或相关技术是否将被用于任何后处理设施或浓缩设施的研究或研制、设计、制造、建造、运行或维护；
 - (e) 接受方政府的行动、声明和政策是否有助于核不扩散，接受方是否遵守其在核不扩散方面的国际义务；
 - (f) 接受方是否已在从事秘密的或非法的采购活动；
 - (g) 向最终用户的某项转让是否未被批准，或者该最终用户是否已将以前批准的任何转让转用于同本准则不相符合的目的；
 - (h) 是否有理由认为存在转用于核恐怖主义行为的危险；
 - (i) 是否由于接受国没有按照联合国安理会第 1540 号决议的规定建立和保持适当、有效的国家出口和转运控制措施而造成违反“基本原则”再转让附件中确定的设备、材料、软件或相关技术或转让其任何复制品的风险。
5. 供应方应确保在附件中未列出的物项打算或可能打算全部或部分进行与“核爆炸活动”有关应用的情况下，其国家法律要求对所述物项的转让进行批准。

供应方将按照其国家许可证审批实践实施这种批准要求。

鼓励供应方共享“一揽子”拒绝转让方面的信息。

转让条件

6. 在确定转让将不会造成不可接受的转用风险的过程中，依据“基本原则”并为符合本准则的目标，供应方应该在批准转让前，以符合本国法律和惯例的方式，获得下述文件：
 - (a) 最终用户提交的一份声明，详细说明拟议中的转让的用途和最终使用地点；
 - (b) 一份保证书，明确声明拟议中的转让或其任何复制品将不会用于任何核爆炸活动或未受保障的核燃料循环活动。

再转让的同意权

7. 在批准将附件中所确定的设备、材料、软件或相关技术转让给一个未接受本准则的国家之前，供应方应得到保证：在将转让的设备、材料、软件或相关技术或其任何复制品再转让到第三国之前，要以符合供应方法律和惯例的方式获得供应方的同意。

最后条款

8. 至于将本准则应用于附件中所列物项之外的其他重要物项，以及除本准则第 5 段所规定的转让条件外，是否应用供应方可能认为必要的其他转让条件，供应方保留自行决定权。
9. 为了促进本准则的有效实施，供应方应在必要时酌情同接受本准则的其他国家交流有关的信息并进行磋商。
10. 为了国际和平与安全，欢迎所有国家接受本准则。

附 件

与核有关的两用设备、材料、软件 和相关技术清单

附 件

说明： 本附件使用国际单位制。在任何情况下，国际单位制规定的物理量应被认为是官方建议的控制值。然而，工具机的某些参数是用通常的单位表示，不属于国际单位制。

本附录通常使用的缩写符号（及其表示量值的前缀）如下：

A	—	安[培]
Bq	—	贝可[勒尔]
°C	—	摄氏度
CAS	—	化学提取服务
Ci	—	居[里]
cm	—	厘米
dB	—	分贝
dBm	—	毫瓦分贝（以 1 毫瓦为基准电平的分贝数）
g	—	克；重力加速度（9.81 米/秒 ² ）
GBq	—	吉贝可
GHz	—	吉赫
GPa	—	吉帕[斯卡]
Gy	—	戈[瑞]
h	—	小时
Hz	—	赫[兹]
J	—	焦[耳]
K	—	开[尔文]
keV	—	千电子伏
kg	—	千克
kHz	—	千赫
kN	—	千牛[顿]
kPa	—	千帕[斯卡]
kV	—	千伏
kW	—	千瓦
m	—	米
mA	—	毫安[培]
MeV	—	兆电子伏
MHz	—	兆赫
ml	—	毫升
mm	—	毫米
MPa	—	兆帕[斯卡]
mPa	—	毫帕[斯卡]
MW	—	兆瓦
μF	—	微法
μm	—	微米
μs	—	微秒
N	—	牛[顿]
nm	—	纳米
ns	—	纳秒
nH	—	纳亨[利]
ps	—	皮秒
RMS	—	均方根
rpm	—	每分钟转数
s	—	秒
T	—	泰斯拉
TIR	—	指示器总读数
V	—	伏[特]
W	—	瓦[特]

总 说 明

下述各段适用于与核有关的两用设备、材料、软件和相关技术清单。

1. 本清单中对各物项的说明既包括新的物项，亦包括旧的物项。
2. 如果对本清单中任何物项的说明不含限制条件或技术规格，这种说明被认为包括该物项的全部品种。类目仅为了便于查阅，而不影响对物项定义的解释。
3. 含有一个或多个受控部件的任何非受控物项（包括工厂），如果所含的一个或多个受控部件是该物项的主要成分并可能移作他用，则不应由于该非受控物项的转让而排除这些控制对象。

说明：在判断受控部件是否被认为是主要成分时，政府应衡量有关数量、价值和所涉专有技术的因素以及可确定受控部件为被购物项主要成分的其他特殊情况。

4. 不应由于零件的转让而排除这类控制对象。各国政府为能达到这种目标，将采取其所能采取的这类行动，并将继续寻求所有供应者均可使用的零件适用定义。

技 术 控 制

“技术”转让根据本准则并按照附件每一节中的规定来控制。与附件所列任何物项直接有关的“技术”将在各国法规的允许范围内经受与设备本身同样程度的详细检查和控制。

附件中任一物项的出口核准亦认可对同一最终用户出口该物项的安装、运行、维护和修理所需要的最少技术。

注：对“技术”转让的控制不适用于“在公共层面”的资料或“基础科学研究”。

关于软件的总说明

根据准则并按照附件的规定对“软件”转让进行控制。

注：对“软件”转让的控制不适用于以下“软件”：

1. 通常用以下方式提供给公众的软件：
 - a. 从没有限制的零售点库存中销售；
 - b. 指定由用户安装而无需供应商给予进一步具体支持的；或
2. “在公共层面的”。

定 义

“精度” ——

通常以误差来度量，其定义为某一指示值同某一认可标准或真值的最大正负偏差。

“角位偏差” ——

在工作台上的工件已回转离开其初始位置后，精确测量的实际角位和角位之间的最大差值（参考：VDI/VDE 2617 草图：“坐标测量机的回转工作台”）。

“基础科学研究” ——

主要为获得现象和可观察到的事实的基本原理的新知识而从事的实验性或理论性工作，此类工作主要不是针对某一具体的实际目的或目标。

“成形控制” ——

系指根据指令进行两种或多种“数控”动作，该指令规定了下一个所要求的位置和到达该位置所要求的进刀速度。而进刀速度随彼此间的关系变化，以便得到一种所要求的成形（参见 ISO/DIS 2806-1980（修订本））。

“研制” ——

涉及“生产”前的各个阶段：

- 设计
- 设计研究
- 设计分析
- 设计概念
- 原型的装配和试验
- 小规模试验生产计划
- 设计数据
- 把设计数据转换成产品的过程
- 构形设计
- 总体设计
- 配置

“纤维状或丝状材料” ——

系指连续的“单纤维”、“细丝”、“粗丝”、“纱”或“带”。

注意:

1. “纤维”或“单纤维”——

是最小长度的纤维，直径通常为几微米。

2. “粗丝”——

是一束大致平行的“线”（典型情况为 12—120 根线）。

3. “线”——

是大致平行排列的一束“纤维”（典型情况为 200 多根纤维）。

4. “带”——

是一种由交织在一起或单向排列的“纤维”、“线”、“粗丝”、“纱”或“细丝”等构成的材料，通常预先注入树脂。

5. “纱”——

是一束通常大致平行的“纤维”。

6. “细丝”——

是一束绞在一起的“线”。

“纤维”——

见“纤维状或丝状材料”。

“在公共层面”——

本清单所述的“在公共层面”系指在其进一步传播后已经能够不受限制地使用的“技术”或“软件”。（版权限制并不排除使用“在公共层面”的“技术”或“软件”。）

“线性度”——

（通常以非线性度衡量）是实际特性（高标度端和低标度端读数的平均值）与一直线的最大偏差，正值或负值，该直线的位置应使最大偏差均衡并减至最小程度。

“测量误差”——

系指规定可测变量的正确值以 95% 的置信水平处于输出值附近多大范围内的特性参数。这种特性参数包括非修正系统偏差、非修正偏移和随机偏差（参考：VDI/VDE 2617）。

“微程序”——

系指保持在一个特殊的存储器里的基本指令序列，通过把其参考指令引入指令寄存器开始执行该基本指令序列。

“单纤维”——

见“纤维状或丝状材料”。

“数控”——

系指通过一种装置来执行某一过程的自动控制，该装置利用通常在操作过程中引入的数字数据（参见 ISO 2382）。

“定位精度”——

根据第 1.B.2 项，连同下述要求提出和确定“数控”工具机的“定位精度”：

(a) 检验条件（ISO 230/2（1988 年），第 3 段）：

- (1) 在测量前 12 小时和测量期间，工具机和精度测量设备要保持在相同的环境温度下。在预测期间，机床的滑座要作连续地循环如同滑座将在精度测量期间所作循环那样；
- (2) 机床必须配备将随机床一并出口的机械的、电子的或软件的补偿手段；
- (3) 用于测量的测量设备的精度应至少是预期工具机精度的 4 倍；
- (4) 用于驱动滑座的电源必须是：
 - (i) 线电压变化不得大于标称额定电压的 $\pm 10\%$ ；
 - (ii) 相对于正常频率频率变化不得大于 ± 2 赫；
 - (iii) 不允许线路停电或断续供电。

(b) 检验程序（第 4 段）：

- (1) 测量期间移动速率（滑座速度）必须是快速横向移动的速率；

注意：对于产生光学性能表面的工具机，移动速率必须等于或小于每分钟 50 毫米；

- (2) 必须以增量方式测量，即从轴行程的一个极点至另一个极点而不返回到起始位置，以便每次移动都指向目标位置；
- (3) 在检验某一轴时，未被测量的轴必须保持在行程中间位置。

(c) 检验结果的说明（第 2 段）：

测量结果必须包括：

- (1) “定位精度”（A）
- (2) 平均反转误差（B）。

“生产” ——

系指下述各生产阶段：

- 建造
- 生产工程
- 制造
- 合成
- 组装（装配）
- 检查
- 试验
- 质量保证

“程序” ——

系指以电子计算机可执行的形式或可转换成这种形式执行某一过程的指令序列。

“分辨率” ——

测量装置的最小增量；在数字测量仪上为最低有效位（参考：ANSI B-89.1.12）。

“粗丝” ——

见“纤维状或丝状材料”。

“软件” ——

系指一群固定在各种有形表达媒体里的一个或多个“程序”或“微程序”。

“线” ——

见“纤维状和丝状材料”。

“带” ——

见“纤维状和丝状材料”。

“技术援助” ——

技术援助可以采用下述形式：规程、特殊技艺、培训、操作知识和咨询服务。

说明：“技术援助”可以包括“技术数据”的转让。

“技术数据”——

“技术数据”可以采用下述形式：蓝图、平面图、图表、模型、公式、工程设计和
技术规格、手册以及诸如磁盘、磁带、只读存储器等其他媒体或器件上所写入
的或记录的规程。

“技术”——

系指本清单所列物项的“研制”、“生产”或“使用”所要求的特定资料。这种
资料可以采用“技术数据”或“技术援助”的形式。

“纱”——

见“纤维状和丝状材料”。

“使用”——

系指运行、安装（包括现场安装）、维护（校核）、修理、大修和整修。

“细丝”——

见“纤维状和丝状材料”。

附 件 目 录

1. 工业设备

1.A. 设备、组件和部件

1.A.1. 高密度辐射屏蔽窗	1-1
1.A.2. 辐射加固电视摄像机，或其所用的透镜	1-1
1.A.3. 机器人、端部操纵装置和控制器	1-1
1.A.4. 遥控机械手	1-3

1.B. 试验和生产设备

1.B.1. 滚压成形机、具有滚压功能的旋压成形机床，和胎具	1-3
1.B.2. 工具机	1-4
1.B.3. 尺寸检验机、仪表或系统	1-6
1.B.4. 受控环境感应炉及其电源	1-8
1.B.5. 等静压压力机和相关设备	1-8
1.B.6. 振动试验系统、设备和部件	1-8
1.B.7. 真空或其他受控环境冶金熔化和铸造炉及相关设备	1-9

1.C. 材料

1-9

1.D. 软件

1-9

1.E. 技术

1-10

附 件 目 录

2. 材料

2.A. 设备、组件和部件

2.A.1. 由耐液态钢系金属的材料制成的坩埚	2-1
2.A.2. 镀铂催化剂	2-2
2.A.3. 管状复合结构	2-2

2.B. 试验和生产设备

2.B.1. 氟设施或工厂及其设备	2-2
2.B.2. 锂同位素分离设施或工厂以及设备	2-2

2.C. 材料

2.C.1. 铝	2-2
2.C.2. 铍	2-3
2.C.3. 铋	2-3
2.C.4. 硼	2-3
2.C.5. 钙	2-3
2.C.6. 三氟化氯	2-3
2.C.7. 纤维状或丝状材料和聚酯	2-3
2.C.8. 铪	2-4
2.C.9. 锂	2-4
2.C.10. 镁	2-4
2.C.11. 马氏体时效钢	2-4
2.C.12. 镭-226	2-5
2.C.13. 钛	2-5
2.C.14. 钨	2-5
2.C.15. 锆	2-5
2.C.16. 镍粉和多孔镍金属	2-5
2.C.17. 氟	2-6
2.C.18. 氦-3	2-6
2.C.19. 发射 α 粒子的放射性核素	2-6

2.D. 软件 2-6

2.E. 技术 2-6

附 件 目 录

3. 铀同位素分离设备和部件（触发清单以外的物项）

3.A. 设备、组件和部件

3.A.1.	频率变换器或发生器	3-1
3.A.2.	激光器、激光放大器和振荡器	3-1
3.A.3.	阀门	3-3
3.A.4.	超导螺线电磁体	3-3
3.A.5.	高功率直流电源	3-3
3.A.6.	高压直流电源	3-3
3.A.7.	压力传感器	3-4
3.A.8.	真空泵	3-4

3.B. 试验和生产设备

3.B.1.	氟生产用电解槽	3-4
3.B.2.	转筒制造或组装设备、转筒矫直设备、弹簧成型箱 心轴和模具	3-4
3.B.3.	离心多面平衡机	3-5
3.B.4.	绕丝机和相关设备	3-5
3.B.5.	电磁同位素分离器	3-6
3.B.6.	质谱仪	3-6

3.C. 材料

3.D. 软件

3.E. 技术

附 件 目 录

4. 与重水生产厂有关的设备（触发清单以外的物项）

4.A. 设备、组件和部件

4.A.1. 专用填料	4-1
4.A.2. 泵	4-1
4.A.3. 涡轮膨胀机或涡轮膨胀机-压缩机装置	4-1

4.B. 试验和生产设备

4.B.1. 水-硫化氢交换塔和内部接触器	4-1
4.B.2. 氢-低温蒸馏塔	4-2
4.B.3. 氨合成转换器或合成器	4-2

4.C. 材料 4-2

4.D. 软件 4-2

4.E. 技术 4-2

5. 研制核爆炸装置所用的试验和测量设备

5.A. 设备、组件和部件

5.A.1. 光电倍增管	5-1
--------------	-----

5.B. 试验和生产设备

5.B.1. 闪光 X 射线发生器或脉冲电子加速器	5-1
5.B.2. 多级轻气炮或其他高速炮系统	5-2
5.B.3. 机械式转镜相机	5-2
5.B.4. 电子扫描相机、电子分幅相机、显像管和装置	5-2
5.B.5. 流体动力学实验专用仪器仪表	5-2
5.B.6. 高速脉冲发生器	5-3

5.C. 材料 5-3

5.D. 软件 5-3

5.E. 技术 5-3

附 件 目 录

6. 核爆炸装置的部件

6.A.	设备、组件和部件	
6.A.1.	雷管和多点起爆系统	6-1
6.A.2.	点火装置和等效大电流脉冲发生器	6-1
6.A.3.	开关装置	6-2
6.A.4.	脉冲放电电容器	6-3
6.A.5.	中子发生器系统	6-3
6.B.	试验和生产设备	6-3
6.C.	材料	
6.C.1.	高能炸药或混合物	6-3
6.D.	软件	6-3
6.E.	技术	6-3

1. 工业设备

1.A. 设备、组件和部件

1.A.1. 高密度（铅玻璃或其他）辐射屏蔽窗，具有以下所有特性和专门为其设计的框架：

- a. “冷区”大于 0.09 平方米；
- b. 密度大于 3 克/立方厘米；
- c. 厚度为 100 毫米或以上。

技术说明： 在 1.A.1.a.项内，“冷区”这一术语系指设计申请书中暴露于最低辐射水平的窗子视区。

1.A.2. 专门设计辐射加固的、或被列为辐射加固的能耐总辐射剂量 5×10^4 戈瑞（硅）以上而又不会降低使用性能的电视摄像机或其所用的透镜。

技术说明： 戈瑞（硅）这一术语系指某一未屏蔽的硅样品暴露于电离辐射时所吸收的以焦耳/千克为单位的能量。

1.A.3. 如下的“机器人”、“端部操纵装置”和控制器如下：

- a. “机器人”或“端部操纵装置”具有以下任一特性：
 - 1. 遵照国家安全标准专门设计用于处理高能炸药（例如，满足高能炸药用电气法规标称值）；或
 - 2. 专门设计或被列为辐射加固的，能经受总剂量大于 5×10^4 戈瑞（硅）的辐射而又不会降低使用性能；

技术说明： 戈瑞（硅）这一术语系指某一未屏蔽的硅样品暴露于电离辐射时所吸收的以焦耳/千克为单位的能量。

- b. 为 1.A.3.a.项中说明的任何“机器人”或“端部操纵装置”专门设计的控制器。

说明： 1.A.3.项并不用于控制为诸如为自动喷漆台之类的非核工业应用专门设计的“机器人”。

技术说明: 1. “机器人”

在 1.A.3.项中,“机器人”系指一种操纵机构,它可以是连续轨径作业,或按点位作业,还可能使用“传感器”并具有下述特性:

- (a) 是多功能的;
- (b) 通过三维空间的可变移动能使材料、零件、工具或专用装置定位或定向;
- (c) 把三个或更多个可能装有步进电机的闭环或开环回路伺服装置组合在一起;
- (d) 通过教学/复演法或通过可能采用可编程序逻辑控制的电子计算机使该机有“用户可存取编程的能力”,即无需机械干预。

注意 1:

在上述定义中“传感器”系指物理现象的探测器,其输出(在转换成一种可由控制器解释的信号之后)能够产生“程序”,或修改程序指令或数字“程序”数据。它包括具有机床显示、红外线成像、声像、触觉测量、惯性位置测量、光学或声学测距或力测量或转矩测量等能力的“传感器”。

注意 2:

在上述定义中,“用户-存取编程能力”系指允许用户采用与下述方法不同的方法插入、修改或替换“程序”的设施:

- (a) 布线或互接上的实际变化;或
- (b) 包括参数登记在内的功能控制器的设置。

注意 3:

上述定义不包括下述装置:

- (a) 仅采用手动控制/遥控的操纵机构;
- (b) 固定顺序操纵机构,它们是按照机械式固定的程序运动的自动运转装置。通过固定的止动件(例如销或凸轮)机械地限制该“程序”。采用机械的、电子的或电气的手段不可能改变或变更运转顺序和轨径或角度的选择;

- (c) 机械式控制可变顺序操纵机构，它们是按照机械式固定的程序运动的自动运转装置。通过固定的、然而却是可调的止动件（例如销或凸轮）机械地限制该“程序”。在固定的“程序”模式里，运转顺序和轨径或角度的选择是可以改变的。只有通过机械操作才能完成在一个或多个运动轴上“程序”模式的改变或修改（例如，更改所用销或调换凸轮）；
- (d) 非伺服控制可变顺序操纵机构，它们是按照机械式固定程序运动的自动运转装置。该“程序”是可以改变的，但是只有通过机械式固定的二进制电气装置输出的二进制信号或可调的止动件才能使运动器继续进行；
- (e) 被称为笛卡尔坐标操纵系统的仓库起重机，是垂直排列贮存箱仓库的组成部分，用于存取贮存箱的内装物，供贮存或提取使用。

2. “端部操纵装置”

在 1.A.3.项中，“端部操纵装置”包括夹钳、“有源刀具加工装置”以及附在“机器人”操纵臂端部支承板上的任何其他刀具。

注意：

上述定义中，“有源刀具加工装置”是一种对工件施加动力源、过程能量或对其进行检测的装置。

1.A.4. 能用来为放射化学分离作业或热室提供远距离操作的遥控机械手，具有以下任一特性：

- a. 能贯穿 0.6 米或更厚的热室壁（“穿壁”作业）；或
- b. 能跨过壁厚为 0.6 米或更厚的热室顶（“跨顶”作业）。

技术说明： 远距离操作的机械手把操作员的动作传递给操作臂和末端夹具。机械手可为“主/仆”型机械手，或者为通过控制柄或键盘操作的机械手。

1.B. 试验和生产设备

1.B.1. 下列滚压成形机床和能起滚压作用的旋压成形机床和胎具：

- a. 该类机床具有以下两种特性：

1. 装有 3 个或 3 个以上压滚（活动式或导向式）；
 2. 按照制造厂提出的技术规格可配备“数控”器或计算机控制器；
- b. 制造转筒的胎具，用其制成的圆柱形转筒内径在 75 毫米至 400 毫米之间。

说明：1.B.1.a.项包括的机床是指那些具有一个用作使金属成形的轴辊和两个用以支持胎具但不直接参加成形过程的辅助轴辊的机床。

- 1.B.2. 下列用于切削或切割金属、陶瓷或复合材料的工具机及其任何组合；根据制造厂的技术说明书，这类工具机可以配备沿两个或多个轴同时作“成形控制”的电子装置：

注意：由其附属“软件”控制的“数控”器，见 1.D.3.项。

- a. 车床，对于能加工大于 35 毫米直径的车床，按照 ISO 230/2（1988 年）“定位精度”在采取了所有补偿手段后沿任一线轴可达到小于（优于）6 微米（总定位）；

说明：1.B.2.a.项不控制仅限于加工贯通进给棒料，最大棒直径等于或小于 42 毫米并且无安装卡盘能力的棒料车床（Swissturn）。车床可有钻和/或铣直径小于 42 毫米的加工件的能力。

- b. 铣床，具有下述任一特征：

1. 按照 ISO 230/2（1988 年）“定位精度”在采取了所有补偿手段后沿任一线性轴可达到小于（优于）6 微米（总定位）；
2. 有 2 个或更多个成形旋转轴；或
3. 有 5 个或更多个能同时调整进行“成形控制”的轴。

说明：1.B.2.b.项不控制具有以下特征的铣床：

1. x 轴行程大于 2 米；
2. 按照 ISO 230/2（1988 年）沿 x 轴的总“定位精度”大于（劣于）30 微米。

- c. 磨床，具有下述任一特征：

1. 按照 ISO 230/2（1988 年）“定位精度”在采取了所有补偿手段后沿任一线性轴可达到小于（优于）4 微米（总定位）；
2. 有 2 个或更多个成形旋转轴；或

3. 有 5 个或更多个能同时调整进行“成形控制”的轴。

说明：1.B.2.c.项不控制下列磨床：

1. 具有下述全部特征的外圆、内圆和内-外圆磨床：
 - a. 最大工件容量限于外径或长度为 150 毫米；
 - b. 仅有 x、z 和 c 轴。
2. 总定位精度小于（优于）4 微米、无 z 轴或 w 轴的坐标磨床。
定位精度依据 ISO 230/2（1988 年）确定。
- d. 具有 2 个或更多个成形旋转轴并能同时调整进行“成形控制”的无丝型放电加工机。

说明：1. 按照 ISO 230/2（1988 年）或等效的国家标准进行测量后根据以下程序得出的固定“定位精度”水平如果提供给国家当局并得到国家当局认可，可以用于各种原型工具机以代替对每一个机械作测试。

按照如下程序导出固定的“定位精度”：

- a. 选择 5 台原型机以供评价；
 - b. 按照 ISO 230/2（1988 年）测量线性轴精度；
 - c. 测量每台机器每支轴线的精度值（A）。ISO 230/2（1988 年）标准中介绍了计算精度值的方法；
 - d. 测量每支轴线的平均精度值。此平均值即可成为该原型机每支轴线的固定的“定位精度”（ $\hat{A}_x, \hat{A}_y, \dots$ ）；
 - e. 既然 1.B.2.项中提到每个线性轴，因此，将会出现与线性轴数同样多的固定的“定位精度”值；
 - f. 如果不受 1.B.2.a.、1.B.2.b.或 1.B.2.c.项控制的某一工具机的任何轴线的固定“定位精度”对磨床而言为 6 微米或更小（更好）和对铣床和车床而言为 8 微米或更小（更好）（两者均按照 ISO 230/2（1988 年）测定），则应要求制造者每 18 个月重申一次精度水平。
2. 1.B.2.项不控制仅限于制造下列任何零件的专用工具机：
- a. 齿轮
 - b. 曲轴或凸轮轴

c. 工具或刀具

d. 挤压机螺杆

- 技术说明:
1. 轴应根据国际标准 ISO 841 《数控机床——轴和动作的名称》命名。
 2. 二次平行成形轴（如卧式钻孔机上的 w 轴或中心线平行于主旋转轴的二次旋转轴）不计入成形轴总数。
 3. 旋转轴不一定需要旋转 360 度。旋转轴可由螺旋杆或齿轮条之类线性装置驱动。
 4. 就 1.B.2.而言，能同时调整进行“成形控制”的轴的数目是在工件加工过程中在工件与工具之间被沿着或围绕着进行同步、相互关联动作的轴的数目。这包括机器内部被沿着或围绕着进行其他相关动作的任何其他轴，如：
 - a. 磨床中的砂轮整形系统；
 - b. 旨在固定单个工件的平行旋转轴；
 - c. 旨在通过从不同端面将工件固定在卡盘中来操作该同一工件的同线旋转轴。
 5. 必须对照每一适用项 1.B.2.a.、1.B.2.b.和 1.B.2.c.对拥有车、铣、磨这 3 种能力中至少 2 种能力的工具机（如具备铣床能力的车床）进行评价。
 6. 1.B.2.b.3 项和 1.B.2.c.3 项包括基于平行线性动力学设计的机器（如六脚机床），这种机器有 5 个或更多个轴，其中没有一个是旋转轴。

1.B.3. 下列尺寸检验机、仪表或系统：

- a. 具有下述两种特性的计算机控制的或数控的尺寸检验机：
 1. 带 2 个或更多个轴；
 2. 使用“精度”高于（优于）0.2 微米的探头，测试一个一维长度的“测量误差”等于或小于（优于） $(1.25 + L/1000)$ 微米（L 是所测长度，单位：毫米）（参考 VDI/VDE 2617 第 1 和 2 部分）；

b. 下述“线性位移”测量仪：

1. 非接触型测量系统，测量范围不超过 0.2 毫米时，其“分辨率”等于或小于（优于）0.2 微米；
2. 具有下述两种特性的线性可变差接变换器系统：
 - a. 测量范围不超过 5 毫米时，其“线性度”等于或高于（优于）0.1%；
 - b. 在标准试验室温下，其误差为 ± 1 开时，每天漂移量等于或小于（优于）0.1%；
3. 具有下述两种特性的测量系统：
 - a. 装有“激光器”；
 - b. 在误差为 ± 1 开的标准温度和标准压力下，保持至少 12 小时：
 1. “分辨率”的满标值为 0.1 微米或更好；
 2. “测量误差”等于或小于（优于） $(0.2 + L/2000)$ 微米（L 是所测长度，单位：毫米）；

说明：1.B.3.b.3.项不控制测量用干涉仪系统，该系统无闭环或开环反馈，装有“激光器”，用以测量工具机、尺寸检验机或类似设备的滑动误差。

技术说明：在 1.B.3.b.项中，“线性位移”系指测量探头与被测物体之间距离的变化。

c. 角位移测量仪，其“角位偏差”等于或小于（优于）0.00025 度；

说明：1.B.3.c.项不对下述光学仪器实施控制，例如使用平行光（如激光）检测反射镜角位移的自动准直仪。

d. 同时检查半轴套线位移和角位移的系统，具有下述两种特性：

1. 沿任一线轴的“测量误差”每 5 毫米等于或小于（优于）3.5 微米；
2. “角位偏差”等于或小于 0.02 度。

说明：1. 如果可以用作测量仪的工具机达到或超过为该测量仪功能所规定的标准，则应包括在 1.B.3.项内。

2. 如果 1.B.3.项中所述尺寸检验机在其工作范围内的任何方面超过规定的阈值，则这种检验机应加以控制。

- 技术说明: 1. 在确定尺寸检验系统的测量误差时所使用的探针必须如 VDI/VDE 2617 第 2、3 和 4 部分所述。
2. 本项中的测量值的所有参数均有正/负之分, 即不表示整个范围。

1.B.4. 下列受控环境(真空或惰性气体)感应炉及其所用电源:

a. 具有以下所有特性的感应炉:

1. 能在 1123 开(850 摄氏度)以上温度条件下工作;
2. 感应线圈直径为 600 毫米或更小;
3. 设计的功率输入为 5 千瓦或更大;

说明: 1.B.4.a.项对用于加工半导体晶片的感应炉不加控制。

- b. 为 1.B.4.a.项中规定的感应炉专门设计的电源, 其规定输出功率为 5 千瓦或更大。

1.B.5. 下列“等静压压力机”和相关设备:

a. 具有以下两个特性的“等静压压力机”:

1. 最大工作压力能够达到 69 兆帕或更大;
2. 室式腔内径超过 152 毫米;

- b. 为 1.B.5.a.项中规定的“等静压压力机”专门设计的模具及模型、控制器。

技术说明: 1. 在 1.B.5.项中, “等静压压力机”系指能够通过各种介质(气体、液体、固体颗粒等)对密闭腔加压的设备, 它能在腔内在所有方向对工件或材料产生同等压力。

2. 在 1.B.5.项中, 室的内部尺寸系指达到工作温度和工作压力室的内部尺寸并且不包括定位器在内。该尺寸将是压力室内径或绝缘炉室内径的较小者, 取决于哪一个室位于另一个室里面。

1.B.6. 下列振动试验系统、设备、部件:

a. 具有以下所有特性的电动式振动试验系统:

1. 使用反馈或闭环控制技术和包括数控装置;
2. 能在 20 赫至 2000 赫之间 10 克或更大均方根条件下振动;

3. 能施力 50 千牛或更大（“空台”测量）；
- b. 数字控制器，装有专为振动试验（实时频宽大于 5 千赫）设计“软件”，该软件也是为上述 1.B.6.a 项规定系统设计的；
- c. 装有或未装有辅助放大器，能施力 50 千牛（“空台”测量）或更大，可用于上述 1.B.6.a.项规定系统的振动推力器（振动装置）；
- d. 设计用来将多台振动装置联接成一完整振动器系统以便能提供有效合并推力 50 千牛（“空台”测量）或更大，可用于上述 1.B.6.a.项规定系统的试验部件支承结构和电子学装置。

技术说明： 在 1.B.6.项中，“空台”系指没有定位器及配件的平台或表面。

1.B.7. 下列真空炉或其他受控环境冶金熔化炉和铸造炉及相关设备：

- a. 具有以下两个特性的电弧再熔炉和铸造炉：
 1. 自耗电电极，其容量在 1000 立方厘米至 20 000 立方厘米之间；
 2. 能在 1973 开（1700 摄氏度）以上的熔化温度工作；
- b. 具有以下两个特性的电子束熔化炉以及等离子体雾化和熔化炉：
 1. 功率为 50 千瓦或更大；
 2. 能在 1473 开（1200 摄氏度）以上的熔化温度工作；
- c. 为 1.B.7.a.或 1.B.7.b.项中规定的任何用炉专门配备的计算机控制和监测系统。

1.C. 材料

无。

1.D. 软件

- 1.D.1. 为“使用”第 1.A.3.、1.B.1.、1.B.3.、1.B.5.、1.B.6.a.、1.B.6.b.、1.B.6.d.或 1.B.7.项中规定的设备专门设计的“软件”。

说明：为 1.B.3.d.项中规定的系统专门设计的“软件”包括为同时测量壁厚和外形所用的“软件”。

- 1.D.2. 专为“研制”、“生产”或“使用”上述1.B.2项中规定的设备而设计或修改的“软件”。

- 1.D.3. 用于电子装置或系统的任一组合，使这个（些）装置起“数控”器的功能而且能控制 5 个或更多个可同时调整进行“成形控制”的内插轴的“软件”。

说明：1. 无论是单独出口的还是装在“数控”器或任何电子装置或系统中的“软件”都受到控制。

2. 1.D.3.项对控制器或工具机制造者为操作未在 1.B.2.项规定之列的工具机而专门设计或修改的“软件”不加控制。

1.E. 技术

- 1.E.1. 与针对“研制”、“生产”或“使用”1.A.项至 1.D.项中所规定的设备、材料或“软件”采取的技术控制措施相应的“技术”。

2. 材 料

2.A. 设备、组件和部件

2.A.1. 下列用耐液态锕系元素金属的材料制造的坩埚：

a. 具有以下两种特性的坩埚：

1. 容积在 150 立方厘米（150 毫升）至 8000 立方厘米（8 升）之间；
2. 用纯度 98%或更高（按重计）的下述任何一种材料制造或作涂层：
 - a. 氟化钙(CaF_2)；
 - b. 锆酸钙（偏锆酸盐）(CaZrO_3)；
 - c. 硫化铈(Ce_2S_3)；
 - d. 氧化铒(Er_2O_3)；
 - e. 氧化铪(HfO_2)；
 - f. 氧化镁(MgO)；
 - g. 氮化铌-钛-钨合金（约 50%铌、30%钛和 20%钨）；
 - h. 氧化钇(Y_2O_3)； 或
 - i. 氧化锆(ZrO_2)；

b. 具有以下两种特性的坩埚：

1. 容积在 50 立方厘米（50 毫升）至 2000 立方厘米（2 升）之间；
2. 用纯度 99.9%或更高（按重计）的钽制造或作衬里；

c. 具有以下三种特性的坩埚：

1. 容积在 50 立方厘米（50 毫升）至 2000 立方厘米（2 升）之间；
2. 用纯度 98%或更高（按重量计）的钽制造或作衬里；
3. 有碳化钽、一氮化钽或硼化钽（或其任何组合）涂层。

2.A.2. 为从重水中回收氙或为生产重水而专门设计或配备用于加速氢和水之间的氢同位素交换反应的镀铂催化剂。

2.A.3. 具有以下两种特性的管状复合结构：

- a. 内径在 75 毫米至 400 毫米之间；
- b. 用 2.C.7.a.项中规定的任何一种 “纤维状或丝状材料” 或 2.C.7.c.项中所述碳聚酯材料制造。

2.B. 试验和生产设备

2.B.1. 下列氙设施、工厂及其设备：

- a. 用于生产、回收、提取、浓缩或处理氙的设施或工厂；
- b. 下列氙设施或工厂用设备：
 - 1. 能够冷却到 23 开（-250 摄氏度）或更低温度的氢或氦的致冷设备，其排热能力大于 150 瓦；
 - 2. 使用金属氢化物作为贮存或净化介质的氢同位素贮存系统或净化装置。

2.B.2. 下列锂同位素分离设施或工厂及所用设备：

- a. 锂同位素分离用设施或工厂；
- b. 下列锂同位素分离用设备：
 - 1. 专门用于锂汞齐的液-液交换填料塔；
 - 2. 汞或锂汞齐泵；
 - 3. 锂汞齐电解槽；
 - 4. 浓缩氢氧化锂溶液用蒸发器。

2.C. 材料

2.C.1. 具有以下两种特性的铝合金：

- a. 在 293 开（20 摄氏度）时的极限抗拉强度 “能达到” 460 兆帕或更大；
- b. 呈管状或圆柱形实心体（包括锻件），外径超过 75 毫米。

技术说明： 2.C.1.项中所述的“能达到”包括未热处理的或经热处理的铝合金。

2.C.2. 铍金属；含铍 50%以上（按重量计）的合金；铍的化合物及其制品以及上述任何制品的废料或碎屑。

说明： 2.C.2.项对以下材料不加控制：

- a. X 射线机或钻孔测井装置的金属窗；
- b. 专门为电子部件设计的或作为电子线路基片的氧化铍产品或半成品；
- c. 绿宝石或海蓝宝石形式的绿柱石（铍和铝的硅化物）。

2.C.3. 具有以下两种特性的铋：

- a. 纯度为 99.99%或更高（按重量计）；
- b. 含银量按重量计低于十万分之一。

2.C.4. 下列硼-10（10B）同位素富集到大于其天然同位素丰度的各种硼材料：元素硼、化合物、含硼混合物和其制品以及上述任何制品的废料或碎屑。

说明： 2.C.4.项中，含硼混合物包括涂硼的材料。

技术说明： 硼-10 天然同位素丰度的重量百分数约为 18.5（原子百分数为 20）。

2.C.5. 具有以下两种特性的钙：

- a. 含金属杂质（除镁外）低于千分之一（按重量计）；
- b. 含硼低于十万分之一（按重量计）。

2.C.6. 三氟化氯（ClF₃）。

2.C.7. 下列“纤维状”或“丝状材料”和聚酯：

- a. 具有以下任一特性的碳或芳酰氨基“纤维状或丝状材料”：
 - 1. “比模量” 12.7×10^6 米或更大；或
 - 2. “比抗拉强度” 23.5×10^4 米或更大；

说明：2.C.7.a.项不控制具有 0.25%或以上（按重量计）酯基纤维表面改性剂的芳酰氨基“纤维状或丝状材料”。

b. 具有以下两种特性的玻璃“纤维状或丝状材料”：

1. “比模量” 3.18×10^6 米或更大；
2. “比抗拉强度”为 7.62×10^4 米或更大；

c. 由 2.C.7.a.或 2.C.7.b.项规定的碳或玻璃“纤维状或丝状材料”所制成的注入了热固型树脂的连续的“细丝”、“粗丝”、“纱”或宽度不超过 15 毫米（聚酯）的“带”。

技术说明：树脂构成复合物的基体。

技术说明： 1. 在 2.C.7.项中，“比模量”系指在温度为 296 ± 2 开（ 23 ± 2 摄氏度）和相对湿度为 $50 \pm 5\%$ 的条件下测量的杨氏模量（单位：牛顿/平方米）除以比重（单位：牛顿/立方米）。

2. 在 2.C.7.项中，“比抗拉强度”系指在温度为 296 ± 2 开（ 23 ± 2 摄氏度）和相对湿度为 $50 \pm 5\%$ 的条件下测量的极限抗拉强度（单位：牛顿/平方米）除以比重（单位：牛顿/立方米）。

2.C.8. 铅金属、含铅量超过 60%（按重量计）的合金、含铅量超过 60%（按重量计）的铅化合物和其制品，以及上述任何材料的废料或碎屑。

2.C.9. 下列锂-6 同位素（ ^6Li ）富集到大于其天然同位素丰度的锂，以及含富集锂的产品或装置：元素锂、合金、化合物或含锂混合物、其制品以及上述任何材料的废料或碎屑。

说明：2.C.9.项不控制热释光剂量计。

技术说明： 锂-6 天然同位素丰度的重量百分数约为 6.5（原子百分数为 7.5）。

2.C.10. 具有以下两种特性的镁：

- a. 含金属杂质（除钙外）少于万分之二（按重量计）；
- b. 含硼少于十万分之一（按重量计）。

2.C.11. 马氏体时效钢，其在 293 开（20 摄氏度）时的极限抗拉强度“能达到”2050 兆帕或更大。

说明：2.C.11.项不控制所有各维线性尺寸为 75 毫米或更小的马氏体时效钢。

技术说明： 2.C.11.项所述的“能达到”包括未经热处理的或经热处理的马氏体时效钢。

2.C.12. 镭-226 (226Ra)、镭-226 合金、镭-226 化合物、含镭-226 的混合物、其制品以及含有上述任何物质的产品或装置。

说明：2.C.12.项不控制以下物项：

- a. 医用施镭器；
- b. 含有不超过 0.37 吉贝可镭-226 的产品或装置。

2.C.13. 具有以下两种特性的钛合金：

- a. 在 293 开 (20 摄氏度) 的极限抗拉强度“能达到”900 兆帕；
- b. 呈管状或圆柱形实心体 (包括锻件)，外径超过 75 毫米。

技术说明： 2.C.13.项中所述的“能达到”包括未经热处理的或经热处理的钛合金。

2.C.14. 具有以下两种特性的钨、碳化钨或含钨 90%以上 (按重量计) 的合金：

- a. 内径在 100 毫米和 300 毫米之间，呈空心圆柱形对称体 (包括圆柱体部分)；
- b. 重量超过 20 千克。

说明：2.C.14.项不控制专门为用作砝码或 γ 射线准直仪设计的钨制品。

2.C.15. 呈下述形式且铪与锆含量之比小于 500 分之一 (按重量计) 的锆：金属锆、含锆 50%以上 (按重量计) 的合金、化合物、其制品，以及上述任何材料的废料或碎屑。

说明：2.C.15.项不控制厚度为 0.10 毫米或更小的锆箔。

2.C.16. 下列镍粉和多孔镍金属：

注意：专门为制造气体扩散膜制备的镍粉见 INFCIRC/254/Part 1 (修订本)。

- a. 具有以下两种特性的镍粉：
 - 1. 镍纯度 99.0%或更高 (按重量计)；
 - 2. 平均粒度按 ASTM B 330 标准测量小于 10 微米；

b. 由 2.C.16.a.项中规定的材料生产的多孔镍金属。

说明：2.C.16.项不控制下列材料：

a. 丝状镍粉；

b. 单孔镍金属板，每块面积不超过 1000 平方厘米。

技术说明：2.C.16.b.项指的是通过压制和烧结 2.C.16.a.项所述材料使之形成一种在整个结构内有許多相连的细孔的金属材料，从而制成的多孔金属。

2.C.17. 氟-氢原子比超过千分之一的氟、氟化物和氟的混合物以及含有这类物质的产品和装置。

说明：2.C.17.项不控制含氟小于 1.48×10^3 吉贝可的产品或装置。

2.C.18. 氦-3 (^3He)、含有氦-3 的混合物和含有上述任何物质的产品或装置。

说明：2.C.18.项不控制含氦-3 少于 1 克的产品或装置。

2.C.19. 发射 α 粒子的其 α 半衰期为 10 天或更长但小于 200 年的以下形态的放射性核素：

a. 元素；

b. 含有 α 总活度为每千克 37 吉贝可或更大的化合物；

c. 含有 α 总活度为每千克 37 吉贝可或更大的混合物；

d. 含有任何上述物质的产品或装置。

说明：2.C.19.项不控制含 α 活度小于 3.7 吉贝可的产品或装置。

2.D. 软件

无。

2.E. 技术

2.E.1. 与针对“研制”、“生产”或“使用”第 2.A.项到 2.D.项中所规定的设备、材料或“软件”采取的技术控制措施相应的“技术”。

3. 铀同位素分离设备和部件 (触发清单以外的物项)

3.A. 设备、组件和部件

3.A.1. 具有下述各种特性的频率变换器或发生器：

注意：为气体离心过程专门设计或制造的频率变换器和发生器按照 INFCIRC/254/Part 1（修订本）加以控制。

- a. 能提供 40 瓦或更高功率的多相输出；
- b. 能在 600 赫至 2000 赫频率范围内工作；
- c. 总的谐波畸变低于（优于）10%；
- d. 频率控制小于（优于）0.1%。

技术说明： 3.A.1.项中的频率变换器也称作变频器或逆变器。

3.A.2. 下列激光器、激光放大器和振荡器：

- a. 具有以下两种特性的铜蒸气激光器：
 - 1. 工作波长在 500 纳米至 600 纳米之间；
 - 2. 平均输出功率为 40 瓦或更大；
- b. 具有以下两种特性的氩离子激光器：
 - 1. 工作波长在 400 纳米至 515 纳米之间；
 - 2. 平均输出功率为 40 瓦或更大；
- c. 下述掺杂钕（而不是玻璃）的激光器，其输出波长在 1000 纳米至 1100 纳米之间，而且具有下列任一特性：
 - 1. 采用脉冲激发和 Q-开关，其脉冲宽度等于或大于 1 纳秒并具有下述任一特性：
 - a. 单横向模式输出，平均输出功率超过 40 瓦；或
 - b. 多横向模式输出，平均输出功率超过 50 瓦；或
 - 2. 倍频后，输出波长在 500 纳米至 550 纳米之间，平均输出功率超过 40 瓦；

- d. 具有以下所有特性的可调脉冲单模式染料激光振荡器：
 - 1. 工作波长在 300 纳米至 800 纳米之间；
 - 2. 平均输出功率超过 1 瓦；
 - 3. 重复率超过 1 千赫；
 - 4. 脉冲宽度小于 100 纳秒；
- e. 具有以下所有特性的可调脉冲染料激光放大器和振荡器：
 - 1. 工作波长在 300 纳米至 800 纳米之间；
 - 2. 平均输出功率超过 30 瓦；
 - 3. 重复率超过 1 千赫；
 - 4. 脉冲宽度小于 100 纳秒；

说明：3.A.2.e.项不控制单模式振荡器。

- f. 具有以下所有特性的变石激光器：
 - 1. 工作波长在 720 纳米至 800 纳米之间；
 - 2. 带宽为 0.005 纳米或更小；
 - 3. 重复率超过 125 赫；
 - 4. 平均输出功率超过 30 瓦；
- g. 具有以下所有特性的脉冲二氧化碳激光器：
 - 1. 工作波长在 9000 纳米至 11 000 纳米之间；
 - 2. 重复率超过 250 赫；
 - 3. 平均输出功率超过 500 瓦；
 - 4. 脉冲宽度小于 200 纳秒；

说明：3.A.2.g.项不对诸如切割和焊接中应用的更高功率（通常为 1 千瓦至 5 千瓦）工业用二氧化碳激光器实施控制，因为这类激光器采用的是连续波，或是宽度超过 200 纳秒的脉冲。

- h. 具有以下所有特性的脉冲激发物激光器（氟化氙、氯化氙和氟化氮）：
 - 1. 工作波长在 240 纳米至 360 纳米之间；

- 2. 重复率超过 250 赫;
- 3. 平均输出功率超过 500 瓦;
- i. 仲氢喇曼移相器, 工作时的输出波长为 16 微米, 重复率超过 250 赫。

3.A.3. 具有以下所有特性的阀门:

- a. 标称尺寸为 5 毫米或更大;
- b. 采用波纹管密封;
- c. 全部用铝、铝合金、镍或含 60%以上镍(按重量计)的镍合金制造或内衬这种材料。

技术说明: 对于入口和出口直径不同的阀门, 3.A.3.a.项的标称尺寸参数是指最小直径。

3.A.4. 具有下述各种特性的超导螺线电磁体:

- a. 能产生超过 2 个特斯拉的磁场;
- b. 长度与内径比超过 2;
- c. 内径超过 300 毫米;
- d. 在内空间中心的 50%内, 磁场均匀度高于 1%。

说明: 3.A.4.项不控制专门为医用核磁共振成像系统设计的和作为该系统部件出口的磁体。

注意: 所谓部件并不一定指同批装运的实际部件。只要有关的出口文件明确规定这种部件关系, 则允许从不同来源单独装运。

3.A.5. 具有以下两种特性的高功率直流电源:

- a. 能在 8 小时内连续产生 100 伏或更高的电压, 输出电流为 500 安或更强;
- b. 8 小时内电流或电压稳定性优于 0.1%。

3.A.6. 具有以下两种特性的高压直流电源:

- a. 能在 8 小时内连续产生 20 千伏或更高的电压, 输出电流为 1 安或更强;
- b. 8 小时内电流或电压稳定性优于 0.1%。

3.A.7. 下列能测量 0—13 千帕任何一点绝对压力并具有以下两种特性的压力传感器：

- a. 配备用铝或铝合金、镍或以重量计含镍大于 60% 的镍合金制造或保护的压敏元；
- b. 具有以下任一特性：
 - 1. 测压小于 13 千帕的满标度和好于满标度 $\pm 1\%$ 的“精度”；或
 - 2. 测压 13 千帕或高于 13 千帕的满标度和好于 ± 130 帕的“精度”。

技术说明： 1. 在 3.A.7.项中，压力传感器是把压力测量结果转变为电信号的装置。

2. 在 3.A.7.项中，“精度”包括常温下非线性度、滞后量和再现性。

3.A.8. 具有以下所有特性的真空泵：

- a. 输入口尺寸为 380 毫米或更大；
- b. 泵送速度为 15 立方米/秒或更高；
- c. 能产生超过 13.3 毫帕的极限真空。

技术说明： 1. 泵送速度可在测量点利用氮气或空气测定。

2. 堵住泵输入端，可在此输入端测定这种极限真空。

3.B. 试验和生产设备

3.B.1. 每小时能产氟 250 克以上的氟生产用电解槽。

3.B.2. 下述转筒制造或组装设备、转筒矫直设备以及弹簧成型箱心轴和模具：

- a. 装配气体离心机转筒管件、挡板和端塞的转筒装配设备；

说明：3.B.2.a.项包括精密心轴、夹钳和热套机。

- b. 使气体离心机转筒管件对准共用轴的转筒矫直设备；

技术说明：在 3.B.2.b.项中，这种设备通常是由连接计算机的精密测量探头组成，该计算机随后控制诸如用于对准转筒管件的气动活塞的动作。

- c. 生产单曲式弹簧箱用的弹簧成型箱心轴和模具。

技术说明：3.B.2.c.项中所说的弹簧箱具有下述特性：

1. 内径为 75 毫米至 400 毫米之间；
2. 长度为 12.7 毫米或更长；
3. 单曲深度超过 2 毫米；
4. 用高强度铝合金、马氏体时效钢或高强度“纤维状或丝状材料”制造。

3.B.3. 下列离心多面平衡机（固定式或便携式、卧式或立式）：

- a. 用于平衡长度为 600 毫米或更长的柔性转筒并具有下述特性的离心平衡机：
 1. 摆幅或轴颈直径大于 75 毫米；
 2. 质量容量从 0.9 千克至 23 千克；
 3. 平衡的旋转速度能够超过 5000 转/分；
- b. 用于平衡空心圆柱形转筒部件并具有下述各种特性的离心平衡机：
 1. 轴颈直径大于 75 毫米；
 2. 质量容量从 0.9 千克至 23 千克；
 3. 通过平衡补偿能使剩余的不平衡等于或小于每个平面 0.010 千克×毫米/千克；
4. 皮带传动型。

3.B.4. 下列绕丝机和相关设备：

- a. 具有以下所有特性的绕丝机：
 1. 其定位、缠绕和卷绕纤维的动作可在两个或多个轴线上进行调整并编程序；
 2. 专门设计制造“纤维状或丝状材料”的复合结构或叠层制品；
 3. 能够卷绕直径在 75 毫米至 400 毫米之间、长度为 600 毫米或更长的圆柱形转筒；
- b. 3.B.4.a.项中规定的绕丝机用的调整和编程控制器；
- c. 3.B.4.a.项中规定的绕丝机用的精密心轴。

- 3.B.5. 电磁同位素分离器，设计或配备一个或多个离子源总的离子束电流输出为 50 毫安或更大。

说明：1. 3.B.5.项包括能富集稳定同位素以及铀同位素的分离器。

注意：能够分离一个质量单位差的铅同位素的分离器亦必然能够富集有三个质量单位差的铀同位素。

2. 3.B.5.项包括具有磁场内和布置在磁场外的离子源及收集器的分离器。

技术说明： 用一个 50 毫安离子源不可能从天然丰度给料中每年分离出多于 3 克的高浓铀。

- 3.B.6. 能够测量 230 或更大原子质量的离子且分辨率高于 2/230 的质量单位的下述质谱仪及其离子源：

注意： 专门为分析六氟化铀在线样品而设计或制造的质谱仪按照 INFCIRC/254/Part 1（修订本）加以控制。

- a. 电感耦合等离子体质谱仪；
- b. 辉光放电质谱仪；
- c. 热电离质谱仪；
- d. 电子轰击质谱仪，其源室是用耐六氟化铀的材料制造，内衬或涂以这种材料；
- e. 具有以下任一特性的分子束质谱仪：
 - 1. 源室是用不锈钢或钼制造，内衬或涂以这种材料，其冷阱能冷却至 193 开（-80 摄氏度）或更低；或
 - 2. 源室是用耐六氟化铀的材料制造，或内衬或涂以这种材料；
- f. 配备微量氟离子源的质谱仪，设计用于锕系元素或锕系氟化物。

3.C. 材料

无。

3.D. 软件

- 3.D.1. 为“使用”3.B.3.或3.B.4.项中规定的设备专门设计的“软件”。

3.E. 技术

- 3.E.1. 与针对“研制”、“生产”或“使用”3.A.项到 3.D.项中规定的设备、材料或“软件”采取的技术控制措施相应的“技术”。

4. 与重水生产厂有关的设备 (触发清单以外的物项)

4.A. 设备、组件和部件

4.A.1. 可以用来从普通水中分离出重水的专用填料，并具有以下两种特性：

- a. 用磷青铜网制成（经过化学处理以提高其润湿性）；
- b. 目的是用于真空蒸馏塔。

4.A.2. 可以用来循环液态氨中浓缩的或稀释的钾酰胺（钾酰胺/氨）催化剂溶液并具有下述全部特性的泵：

- a. 气密的（即密封的）；
- b. 容量超过 8.5 立方米/小时；
- c. 以下任一特性：
 - 1. 对于浓缩的钾酰胺溶液（1%或更高），工作压力为 1.5 兆帕至 60 兆帕；或
 - 2. 对于稀释的钾酰胺溶液（小于 1%），工作压力为 20 兆帕至 60 兆帕。

4.A.3. 具有以下两种特性的涡轮膨胀机或涡轮膨胀机-压缩机装置：

- a. 工作时出口温度为 35 开（-238 摄氏度）或更低；和
- b. 氢气通过量为每小时 1000 千克或更多。

4.B. 试验和生产设备

4.B.1. 下列水-硫化氢交换板式塔和塔内接触器：

注意： 关于专门为生产重水而设计或制造的塔，见 INFCIRC/254/Part 1（修订本）。

- a. 具有以下所有特性的水-硫化氢交换板式塔：
 - 1. 工作压力可达到 2 兆帕或更高；
 - 2. 用碳钢制成，采用晶粒型号为 5 或更高型号的美国材料试验学会标准（或相同标准的）奥氏体钢；

3. 直径 1.8 米或更大；

b. 4.B.1.a.项中规定的水-硫化氢交换板式塔的内接触器。

技术说明：这种塔的内接触器是各种扇形板，有效组装直径为 1.8 米或更大，设计得有利于逆流接触并用碳含量为 0.03%或更低的不锈钢制成。这些接触器可为筛板、浮阀塔板、泡罩塔盘或栅板塔盘。

4.B.2. 具有下述全部特性的氢-低温蒸馏塔：

a. 工作时的内部温度为 35 开（-238 摄氏度）或更低；

b. 工作时的内部压力为 0.5 兆帕至 5 兆帕；

c. 用以下任一材料制成：

1. 用含硫量低并采用晶粒型号为 5 或更高型号的美国材料试验学会标准（或相同标准）奥氏体 300 系列不锈钢制成；或

2. 耐低温并与氢相容的等效材料；

d. 内径为 1 米或更大，有效长度为 5 米或更长。

4.B.3. 氨合成转换器或合成器，其中合成气体（氮和氢）来自氨/氢高压交换塔，而合成氨返回到所述的塔里。

4.C. 材料

无。

4.D. 软件

无。

4.E. 技术

4.E.1. 与针对“研制”、“生产”或“使用”4.A.项到 4.D.项中规定的设备、材料或“软件”采取的技术控制措施相应的“技术”。

5. 研制核爆炸装置所用的试验和测量设备

5.A. 设备、组件和部件

5.A.1. 具有以下两种特性的光电倍增管：

- a. 光阴极面积大于 20 平方厘米；
- b. 阳极脉冲上升时间小于 1 纳秒。

5.B. 试验和生产设备

5.B.1. 具有以下两系列特性之一的闪光 X 射线发生器或脉冲电子加速器：

- a.
 1. 加速器峰值电子能量为 500 千电子伏或更高，但低于 25 兆电子伏；
 2. 品质因数（K）为 0.25 或更高；或
- b.
 1. 加速器峰值电子能量为 25 兆电子伏或更高；
 2. 峰值功率超过 50 兆瓦。

说明：5.B.1.项对那些属于为非电子束或 X 射线辐射（例如电子显微镜）目的设计的装置部件的加速器和为医用目的设计的加速器不实施控制。

技术说明：1. 品质因素 K 定义为 $K = 1.7 \times 10^3 V^{2.65} Q$ 。V 是峰值电子能量（单位：百万电子伏），如果加速器电子束脉冲宽度小于或等于 1 微秒，则 Q 为总的加速电荷（单位：库仑）；如果加速器电子束脉冲宽度大于 1 微秒时，则 Q 为 1 微秒内的最大加速电荷。Q 等于 i 对 t 的积分，区间是 1 微秒或电子束脉冲宽度二者中的较小者（ $Q = \int i dt$ ），式中 i 是电子束电流（单位：安培），t 是时间（单位：秒）。

2. 峰值功率 = （峰值电位，单位：伏）× （电子束峰值电流，单位：安培）。

3. 在基于微波加速腔的加速器里，电子束脉冲时间宽度是 1 微秒或由微波调制器脉冲产生的聚束群持续时间二者中的较小者。

4. 在基于微波加速腔的加速器里，电子束峰值电流为聚束群持续时间内的平均电流。

5.B.2. 多级轻气炮或其他高速炮系统（线圈、电磁、电热型或其他先进的系统），能够把弹丸加速至每秒 2 千米或更快。

5.B.3. 下列机械式转镜相机和为其专门设计的部件：

- a. 记录速率超过每秒 225 000 帧的分幅相机；
- b. 书写速度超过每微秒 0.5 毫米的扫描相机。

说明： 在 5.B.3.项中，此种相机的部件包括同步电子部件和转动组件（由涡轮、反射镜和轴承组成）。

5.B.4. 下列电子扫描相机、电子分幅相机、显像管及装置：

- a. 电子扫描相机，时间分辨率为 50 纳秒或更小；
- b. 5.B.4.a.项中所述的相机的条纹显像管；
- c. 电子（或电子快门）分幅相机，帧曝光时间为 50 纳秒或更短；
- d. 5.B.4.c.项规定的相机所用的下述分幅显像管和固态成像器件：
 - 1. 近聚焦图象增强管，其光电阴极贴附在透明的导电膜上，以降低光电阴极薄片电阻；
 - 2. 选通硅靶增强视像管，在光电子撞击硅靶增强视像管板极之前，有一个快速系统选通从光电阴极发出的光电子；
 - 3. 克耳盒或袖珍盒电光快门；
 - 4. 专门为 5.B.4.c.项中规定的相机设计的其他分幅管和固态成像器件，其快速成像选通时间小于 50 纳秒。

5.B.5. 下列流体动力学实验专用仪器仪表：

- a. 用于测量速度超过 1 千米/秒、持续时间间隔少于 10 微秒的速度干涉仪；
- b. 压力超过 10 吉帕的锰铜压力计；
- c. 压力超过 10 吉帕的石英压力传感器。

说明： 5.B.5.a.项包括诸如适用于任意反射镜的速度干涉仪系统和多普勒激光干涉仪等速度干涉仪。

5.B.6. 具有以下两种特性的高速脉冲发生器:

- a. 在小于 55 欧姆电阻负载上的输出电压大于 6 伏;
- b. “脉冲转换时间”小于 500 皮秒。

技术说明: 在 5.B.6.b.项中, “脉冲转换时间”定义为电压幅度从 10%增至 90%时的时间间隔。

5.C. 材料

无。

5.D. 软件

无。

5.E. 技术

- 5.E.1. 与针对“研制”、“生产”或“使用”5.A.项到 5.D.项中规定的设备、材料或“软件”采取的技术控制措施相应的“技术”。

6. 核爆炸装置的部件

6.A. 设备、组件和部件

6.A.1. 下列雷管和多点起爆系统：

- a. 下述类型电驱动的炸药雷管：
 1. 爆炸电雷管电桥；
 2. 爆炸电雷管电桥导线；
 3. 飞片；
 4. 爆炸箔起爆器；
- b. 使用单个或多个雷管的装置，该装置设计成可由单一的点火信号几乎同时起爆其面积超过 5000 平方毫米的炸药面，传遍炸药表面的起爆同时性小于 2.5 微秒。

说明：6.A.1.项不控制仅使用起爆药（如叠氮化铅）的雷管。

技术说明： 6.A.1.项中所述雷管均利用一小导电体（例如电桥、电桥导线或箔），当快速大电流脉冲通过上述导电体时，导电体会因爆炸而汽化。在非飞片型雷管里，爆炸导体引起接触的高能炸药材料如太安（季戊四醇四硝酸酯）化学爆轰。在飞片型雷管里，导电体的爆炸蒸汽驱动飞层或飞片飞过一个间隙，飞片撞击炸药而引起化学爆轰。在某些设计中，飞片是由磁力驱动。术语爆炸箔雷管，可以指爆炸电雷管电桥，或指飞片型雷管。起爆器一词有时也被用来代替雷管一词。

6.A.2. 下列点火装置和等效大电流脉冲发生器：

- a. 驱动上述 6.A.1.项中规定的多个受控雷管用的炸药雷管点火装置；
- b. 具有下述各种特性的模块式电脉冲发生器（脉冲源）：
 1. 设计成便携式、可移动或加固型；
 2. 密封在防尘罩内；
 3. 能在不足 15 微秒时间内输出能量；
 4. 输出电流大于 100 安；

5. 在小于 40 欧姆负载上的“上升时间”小于 10 微秒；
6. 尺寸小于 25.4 厘米；
7. 重量小于 25 千克；
8. 规定用于宽温度范围 223 开至 373 开（-50 摄氏度至 100 摄氏度），或规定适用于宇航。

说明：6.A.2.b.项包括氙闪光灯激励器。

技术说明： 6.A.2.b.5 项中，“上升时间”定义为：当电流通过电阻负载时，电流幅度由 10%增加到 90%时的时间间隔。

6.A.3. 下列开关装置：

- a. 具有下列各种特性的冷阴极管，不管是否充了气体，其作用类似于放电器：
 1. 含有 3 个或更多的电极；
 2. 阳极峰值额定电压为 2.5 千伏或更高；
 3. 阳极峰值额定电流为 100 安或更强；
 4. 阳极延迟时间为 10 微秒或更短；

说明：6.A.3.a.项包括气体弧光放电充气管和真空静电喷射管。

- b. 具有下列两种特性的触发式放电器：
 1. 其阳极延迟时间为 15 微秒或更短；
 2. 峰值额定电流为 500 安或更大；
- c. 具有下述各种特性并执行快速开关功能的模件或组件：
 1. 阳极峰值额定电压高于 2 千伏；
 2. 阳极峰值额定电流为 500 安或更大；
 3. 接通时间为 1 微秒或更短。

6.A.4. 具有下述任一系列特性的脉冲放电电容器：

- a. 1. 额定电压大于 1.4 千伏；
- 2. 储能大于 10 焦；
- 3. 电容大于 0.5 微法；
- 4. 串联电感小于 50 纳亨；或
- b. 1. 额定电压大于 750 伏；
- 2. 电容大于 0.25 微法；
- 3. 串联电感小于 10 纳亨。

6.A.5. 具有以下两种特性的中子发生器系统（包括中子管）：

- a. 在无外真空系统条件下工作；
- b. 利用静电加速来诱发氘-氘核反应。

6.B. 试验和生产设备

无。

6.C. 材料

6.C.1. 含有超过 2%（按重量计）的下述任一物质的高能炸药或混合物：

- a. （环）四亚甲基四硝胺（化学提取服务 2691-41-0）；
- b. （环）三亚甲基三硝胺（化学提取服务 121-82-4）；
- c. 三氨基三硝基苯（化学提取服务 3058-38-6）；
- d. 六硝基芪（化学提取服务 20062-22-0）；或
- e. 晶体密度大于 1.8 克/立方厘米、爆速超过 8000 米/秒的各种炸药。

6.D. 软件

无。

6.E. 技术

6.E.1. 与针对“研制”、“生产”或“使用”6.A.项到 6.D.项中规定的设备、材料或“软件”采取的技术控制措施相应的“技术”。

“核转让准则”（INFCIRC/254/Rev.6/Part 2）修改对照表

旧文件	新文件
<u>出口许可证审批程序的制订</u> 1. B. 2. 下列用于切削或切割金属、陶瓷或复合材料的工具机；根据制造厂的技术说明书，这类工具机可以配备沿两个或多个轴同时作“成形控制”的电子装置： <u>注意</u>：由……“数控”器…… a. 车床，…… <u>说明</u>：1. B. 2. a. 项不控制……棒料车床…… b. 铣床，…… 1. ……“定位精度”在采取了所有…… 2. 有 2 个或更多个成形旋转轴； <u>说明</u>：1. B. 2. b. 项不控制具有以下特征的……： 1. x 轴行程大于 2 米； 2. ……总“定位精度”……	<u>出口许可证审批程序的制订</u> 4. <u>(i) 是否由于接受国没有按照联合国安理会第 1540 号决议的规定建立并保持适当、有效的国家出口和转运控制措施而造成违反“基本原则”再转让附件中确定的设备、材料、软件或相关技术或转让其任何复制品的风险。</u> 1. B. 2. 下列用于切削或切割金属、陶瓷或复合材料的工具机<u>及其任何组合</u>；根据制造厂的技术说明书，这类工具机可以配备沿两个或多个轴同时作“成形控制”的电子装置： <u>注意</u>：由……“数控”器…… a. 车床，…… <u>说明</u>：1. B. 2. a. 项不控制……棒料车床…… b. 铣床，…… 1. ……“定位精度”在采取了所有…… 2. 有 2 个或更多个成形旋转轴； 3. <u>有 5 个或更多个能同时调整进行“成形控制”的轴。</u> <u>说明</u>：1. B. 2. b. 项不控制具有以下特征的……： 1. x 轴行程大于 2 米； 2. ……总“定位精度”……

“核转让准则”（INFCIRC/254/Rev. 6/Part 2）修改对照表

旧文件	新文件
c. 磨床，具有下述任一特征： 1. “定位精度”在..... 2. 有 2 个或更多个成形旋转轴； 说明：1.B.2.c.项不控制下列磨床： 1. 具有下述全部特征的外圆、内圆和内-外圆磨床： a. 限于磨圆柱面； b. 最大工件外径或长度为 150 毫米； c. 不超过 2 个能同时调整的“成形控制”轴； d. 无成形 c 轴； 2. 限于有 x、y、c 和 a 轴的坐标磨床，其中 c 轴用于保持磨轮垂直于工件表面，配备 a 轴是为了磨筒形凸轮； 3. 带有专为制造工具和刀具的“软件”的工具磨床或刀具磨床； 4. 曲轴磨床或凸轮轴磨床。	c. 磨床，具有下述任一特征： 1. “定位精度”在..... 2. 有 2 个或更多个成形旋转轴；或 3. 有 5 个或更多个能同时调整进行“成形控制”的轴。 <u>说明</u>：1.B.2.c.项不控制下列磨床： 1. 具有下述全部特征的外圆、内圆和内-外圆磨床： a. 限于磨圆柱面； - ba. <u>最大工件外径或长度为 150 毫米；最大工件容量限于外径或长度为 150 毫米；</u> - eb. 不超过 2 个能同时调整的“成形控制”轴；<u>仅有 x、z 和 c 轴。</u> d. 无成形 c 轴； 2. 限于有 x、y、c 和 a 轴的坐标磨床，其中 c 轴用于保持磨轮垂直于工件表面，配备 a 轴是为了磨筒形凸轮；<u>总定位精度小于（优于）4 微米、无 z 轴或 w 轴的坐标磨床。定位精度依据 ISO 230/2（1988 年）确定。</u> 3. 带有专为制造工具和刀具的“软件”的工具磨床或刀具磨床； 4. 曲轴磨床或凸轮轴磨床。

“核转让准则”（INFCIRC/254/Rev. 6/Part 2）修改对照表

旧文件	新文件
d. ……无丝型放电加工机。 说明：按照 ISO 230/2（1988 年）或等效的国家标准进行测量后根据以下程序得出的固定“定位精度”水平如果提供给国家当局并得到国家当局认可，可以用于各种原型工具机以代替对每一个机械作测试。 按照如下程序导出固定的“定位精度”： 1. 选择 5 台原型机以供评价； 2. 按照 ISO 230/2（1988 年）测量线性轴精度； 3. 测量……精度值（A）……； 4. 测量每支轴线的平均精度值。此平均值即可成为该原型机每支轴线的固定的“定位精度”（$\hat{A}_x$，$\hat{A}_y$……）； 5. 既然 1.B.2.项中提到每个线性轴，因此，将会出现与线性轴数同样多的固定的“定位精度”值； 6. 如果不受 1.B.2.a.、1.B.2.b.或 1.B.2.c.项控制的某一工具机的任何轴线的固定“定位精度”对磨床而言为 6 微米或更小（更好）和对铣床和车床而言为 8 微米或更小（更好）（两者均按照 ISO 230/2（1988 年）测定），则应要求制造者每 18 个月重申一次精度水平。	d. ……无丝型放电加工机。 说明：1. 按照 ISO 230/2（1988 年）或等效的国家标准进行测量后根据以下程序得出的固定“定位精度”水平如果提供给国家当局并得到国家当局认可，可以用于各种原型工具机以代替对每一个机械作测试。 按照如下程序导出固定的“定位精度”： 1-a. 选择 5 台原型机以供评价； 2-b. ……测量线性轴精度； 3-c. 测量……精度值（A）……； 4-d. 测量……平均精度值……； 5-e. 既然 1.B. 2. 项中提到每个线性轴，因此，将会出现与线性轴数同样多的固定的“定位精度”值； 6-f. 如果不受 1.B. 2. a. 、1.B. 2. b. 或 1.B. 2. c. 项控制的某一工具机的任何轴线的固定“定位精度”对磨床而言为 6 微米或更小（更好）和对铣床和车床而言为 8 微米或更小（更好）（两者均按照 ISO 230/2（1988 年）测定），则应要求制造者每 18 个月重申一次精度水平。

“核转让准则”（INFCIRC/254/Rev. 6/Part 2）修改对照表

旧文件	新文件
	2. <u>1. B. 2. 项不控制仅限于制造下列任何零件的专用工具机：</u> a. <u>齿轮</u> b. <u>曲轴或凸轮轴</u> c. <u>工具或刀具</u> d. <u>挤压机螺杆</u>
<u>技术说明</u>：1. 轴应根据国际标准 ISO 841……命名。 2. 中心线平行于主旋转轴的二次平行成形轴不计入成形旋转轴总数。 3. 旋转轴……	<u>技术说明</u>：1. 轴应根据国际标准 ISO 841……命名。 2. <u>中心线平行于主旋转轴的二次平行成形轴</u> <u>旋转</u> <u>（如卧式钻孔机上的 w 轴或中心线平行于主旋转轴的二次旋转轴）</u> 不计入成形轴总数。 3. 旋转轴……
	4. <u>就 1.B.2.而言，能同时调整进行“成形控制”的轴的数目是在工件加工过程中在工件与工具之间被沿着或围绕着进行同步、相互关联动作的轴的数目。这不包括机器内部被沿着或围绕着进行其他相关动作的任何其他轴，如：</u> a. <u>磨床中的砂轮整形系统；</u> b. <u>旨在固定单个工件的平行旋转轴；</u> c. <u>旨在通过从不同端面将工件固定在卡盘中来操作该同一工件的同线旋转轴。</u>

“核转让准则”（INFCIRC/254/Rev. 6/Part 2）修改对照表

旧文件	新文件
	<u>5. 必须对照每一适用项 1.B.2.a.、1.B.2.b.和 1.B.2.c.对拥有车、铣、磨这 3 种能力中至少 2 种能力的工具机（如具备铣床能力的车床）进行评价。</u> <u>6. 1.B.2.b.3 项和 1.B.2.c.3 项包括基于平行线性动力学设计的机器（如六脚机床），这种机器有 5 个或更多个轴，其中没有一个是旋转轴。</u>
1. B. 3. 下列尺寸检验机、仪表或系统…… b. 下述“线性位移”测量仪…… 3. 具有下述两种特性的测量系统…… c. 角位移测量仪，其“角位偏差”等于或小于（优于）0.00025 度； <u>说明</u>：1.B.3.c.项不对下述光学仪器实施控制，例如使用平行光检测反射镜角位移的自动准直仪。	1. B. 3. 下列尺寸检验机、仪表或系统…… b. 下述“线性位移”测量仪…… 3. 具有下述两种特性的测量系统…… c. 角位移测量仪，其“角位偏差”等于或小于（优于）0.00025 度； <u>说明</u>：1.B.3.c.项不对下述光学仪器实施控制，例如使用平行光（<u>如激光</u>）检测反射镜角位移的自动准直仪。